

Verfahren zum Prüfen oder Kalibrieren der winkelabhängigen Ausrichtung eines hochpräzisen Prüflings

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Prüfen oder
5 Kalibrieren der winkelabhängigen Ausrichtung eines
hochpräzisen Prüflings.

Zum Prüfen oder Kalibrieren von Hochpräzisionsteilen, die
entweder zur hochgenauen Messung, Überprüfung oder Vorgabe von
10 Winkeln mit einer Präzision bis unter $0,5''$ bzw. $0,15 \text{ mgon}$
dienen, oder allgemein hochgenaue Winkelausrichtungen
erfordern, werden höchstpräzise Prüf- oder
Kalibriervorrichtungen benötigt, deren Genauigkeit noch höher
liegen muss als die der zu prüfenden oder kalibrierenden
15 hochpräzisen Prüflinge.

Insbesondere zum Prüfen oder Kalibrieren eines Theodolits, bei
dem ein Horizontal- und ein Vertikalwinkel durch -
beispielsweise statische oder dynamische - Winkelabgriffe
20 bestimmt werden; sind unterschiedliche Vorrichtungen und
Verfahren aus dem Stand der Technik bekannt.

Bei einem klassischen, seit längerem bekannten Théodoliten-
Winkelabgriffsprüfverfahren wird von einem fixen Standpunkt
25 aus manuell mit dem Theodolit-Fernrohr auf mehrere
feststehende, um den Standpunkt verteilte Kollimatoren
gezielt. Dabei wird die Konstanz der Winkeldifferenzen,
gemessen an verschiedenen Kreisstellen des Prüflings, als Mass
für die horizontale Winkelmessgenauigkeit verwendet. Für die
30 vertikale Messgenauigkeit werden die
Kollimatorwinkeldifferenzen mit den Sollwerten verglichen.
Teilkreisprüfgeräte zur Durchführung eines derartigen
Teilkreisprüfverfahrens sind bekannt (z.B. Geräte PRUTE und
PRUFO der Fa. F.W. Breithaupt & Sohn). Derartige Verfahren

BESTÄTIGUNGSKOPIE

entsprechen im Wesentlichen dem Prüfverfahren nach ISO - Norm 17123-3 (Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments), jedoch wird dort nicht auf Kollimatoren, sondern auf fixe Ziele gezielt.

- 5 Nachteile dieser Theodoliten-Winkelabgriffsprüfverfahren sind unter anderem, dass eine vollständige Automatisierung des Messvorgangs nur bedingt möglich ist, die Anzahl der möglichen unterschiedlichen Messungen auf die Anzahl der anzielbaren Kollimatoren beschränkt ist und das Messergebnis stark vom
10 Beobachter abhängt.

Eine Alternative zu den vorgenannten Verfahren stellt das interferometrische Prüfverfahren von Maurer (Maurer, W.: Ein
15 interferometrisches Verfahren zur Bestimmung von Strichverbesserungen an eingebauten Theodolitenkreisen; Dissertation München, 1983; Deumlich, F. & Staiger, R.: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik) dar. Bei diesem Verfahren wird der Winkel, um den der zu prüfende Theodolit gedreht wird, aus der Wegdifferenz eines Laserstrahls zu
20 Interferometerreflektoren abgeleitet. Der maximale interferometrisch messbare Winkel beträgt +/- 8,5 gon, die Auflösung wird mit 0,01 mgon angegeben. Mit dem interferometrischen Verfahren ist lediglich eine Prüfung von Horizontalwinkeln möglich. Für die Prüfung von Vertikalwinkeln
25 ist dieses Verfahren ungeeignet, da eine Prismenhalterung verdrehbar mit der Kippachse des Theodolits verbunden werden müsste, wodurch eine Beeinflussung des Vertikalwinkelabgriffs und der Kippachse aufgrund des zusätzlichen Gewichts der Prismenhalterung nicht auszuschliessen wäre.

- 30 Prüfverfahren zur Prüfung eines ausgebauten Teilkreises, beispielsweise eines Theodolits, sind aus dem Stand der Technik bekannt. Bei diesen Verfahren handelt es sich vornehmlich um Komparierverfahren, bei denen der zu prüfende

Winkelabgriff am Teilkreis mit einem entsprechend genauen Winkelnormal, beispielsweise interferometrisch oder mittels eines Präzisionsteilkreises, verglichen wird. Unterschiedliche Vorrichtungen dieser Art, die beispielsweise in der

- 5 Physikalischen Technischen Bundesanstalt (Prowe, B.: Untersuchungen an einem neuen Teilkreisprüfgerät; Feinwerktechnik & Messtechnik, Heft 5, 1985, S. 213-217) oder am Zentralinstitut für Physik der Erde (Weise, H. & Quart, W.: Eine vollautomatische Messanlage zur Prüfung von
10 Kreisteilungen; Feingerätetechnik, Heft 4, 1975, S. 155-160) eingesetzt werden, oder weitere Vorrichtungen zur Prüfung von Teilkreisteilungen, z.B. aus CH 372847 oder CH 372471, sind aus dem Stand der Technik bekannt. Bei diesen Verfahren und Vorrichtungen ist jedoch keine Winkelabgriffsprüfung eines
15 fertig montierten Theodolits sondern lediglich die Prüfung eines ausgebauten Teilkreises möglich. Ausserdem sei auf die ISO - Norm 17123-3 (Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments) oder die DIN 18723, Teil 3 (Feldverfahren zur
20 Genauigkeitsuntersuchung geodätischer Instrumente) verwiesen.

Eine Vorrichtung und eine Verfahren zum vollautomatischen Prüfen und Kalibrieren eines Theodolits, eines Tachymeters
25 oder einer Totalstation, im Folgenden mit dem Begriff „Theodolit“ zusammengefasst, ist aus dem Stand der Technik bekannt. Diese so genannte „Theodolitenprüfmaschine“ wird beispielsweise detailliert in dem Beitrag „TPM - Ein neues Gerät zur vollautomatischen Prüfung von Teilkreisen in
30 elektronischen Theodoliten“ von Hilmar Ingensand zum X. Internationalen Kurs für Ingenieurvermessung an der Technischen Universität München vom 12.-17.9.1988 und in der Diplomarbeit „Kalibriereinrichtung für Theodoliten“ von Andreas Rützler, ausgeführt am Institut für allgemeine

- Elektrotechnik und elektrische Messtechnik der Technischen Universität Graz im Oktober 1991, beschreiben. Die Theodolitenprüfmaschine weist eine Genauigkeit von etwa 0,1 mgon auf und dient beispielsweise zur Prüfung von
- 5 elektronischen Theodoliten mit einem codierten Teilkreisabgriffsysteem, das ohne die sonst bei Inkrementalverfahren notwendige Initialisierung sofort einen Winkel ausgibt, jedoch anstatt einer diametralen Teilkreisabtastung nur einen einzigen Winkelabgriff aufweist.
- 10 Der hierbei entstehende Fehler durch die mechanische Exzentrizität des Teilkreises ist spezifisch für jeden Theodolit und kann nach Messung mit der Theodolitenprüfmaschine im elektronischen Theodolit gespeichert und automatisch korrigiert werden. Die
- 15 Theodolitenprüfmaschine ermöglicht einen vollautomatischen Prüfablauf, die Prüfung von Horizontal- und Vertikal-Winkelabgriffen in Gebrauchslage im eingebauten Zustand, die Prüfung über einen Grossteil des nutzbaren Messbereichs des Theodoliten, die Analyse der im Prüfvorgang festgestellten
- 20 systematischen Fehler und die automatische Bestimmung einer Korrekturfunktion, die im Theodolit abgespeichert wird. Die Theodolitenprüfmaschine ist für unterschiedliche Theodolitenbaureihen geeignet.
- 25 Im Folgenden wird diese aus dem Stand der Technik bekannte Theodolitenprüfmaschine unter Zuhilfenahme von Figuren genauer beschrieben. Es zeigen
- Fig. 1 das Komparatorkonzept der aus dem Stand der Technik
30 bekannten Theodolitenprüfmaschine; und
- Fig. 2 den Vorrichtungsaufbau der aus dem Stand der Technik bekannten Theodolitenprüfmaschine.

Die bekannte Theodolitenprüfmaschine, die auf dem in Fig. 1 dargestellten Komparatorkonzept basiert, verfolgt den Gedanken eines „Theodolits im Theodolit“. Das Achssystem der Theodolitenprüfmaschine entspricht somit geometrisch dem des zu prüfenden Theodolits, so dass ein im Wesentlichen gemeinsames Achssystem mit einer Vertikalachse 101 und einer Horizontalachse 102 entsteht. Der Theodolit ist symbolhaft in Form einer Alhidade 103, die um die Vertikalachse 101 gegenüber einem Unterteil 104 des Theodolits drehbar ist, und eines um die Horizontalachse 102 kippbaren Fernrohrs 105 mit einer Zielachse 106 dargestellt. Da eine absolute Zentrierung der Achssysteme des zu prüfenden Theodolits und der Theodolitenprüfmaschine ausgeschlossen ist, werden die Winkelmesssysteme, das Normal der Theodolitenprüfmaschine und der Winkelabgriff des Theodolits über Autokollimation mittels eines um die Horizontalachse 102 schwenkbaren Autokollimators 107 gekoppelt. Die Kopplung erfolgt mittels eines kollinierten Strahlenbündels 113 über einen auf dem Fernrohr 105 fixierten planen Aufsatzspiegel 108. Da die Theodolitenprüfmaschine sowie der Theodolit die Rechtwinkelbedingung der Achsen (101, 102, 106) erfüllt, sind alle Achssysteme in der Autokollimationseinstellung kollinear. Bedingt durch den Aufbau von Theodoliten ist der Ablauf der Horizontal- und Vertikalprüfung unterschiedlich. Bei der Horizontalprüfung bleibt die Alhidade 103 des zu prüfenden Theodolits weitgehend fixiert und das Unterteil 104, das mechanisch mit der Winkelnormal verbunden ist, wird um die Vertikalachse 101 gedreht. Nach einer Grobeinstellung des Prüfwinkels durch Drehen des Unterteils 104 des Theodolits gegenüber der weitgehend unbewegten Alhidade 103 erfolgt ein Feineinstellen des Prüfwinkels über Autokollimation, indem das Unterteil 104 und die Alhidade 103 gemeinsam hochpräzise gedreht werden und gegebenenfalls der Autokollimator 107 geringfügig geschwenkt wird, wodurch der Theodolit und das Normal in Referenz

gebracht werden. Die Horizontalpositionen werden durch einen höchstpräzisen Horizontalabgriff 109 der Theodolitenprüfmaschine und einen Horizontalabgriff 110 des Theodolits erfasst und verglichen. Die Vertikalprüfung

- 5 erfolgt, indem der Autokollimator 107 in der gemeinsamen Vertikalebene um die Horizontalachse 102 und somit um den zu prüfenden Theodoliten geschwenkt wird. Dabei wird das Fernrohr 105 des Theodolits um den vorgegebenen Winkel grob mitgedreht. Nach der anschliessenden Autokollimationseinstellung werden
10 die Vertikalposition des Autokollimators 107 durch einen höchstpräzisen Vertikalabgriff 111 der Theodolitenprüfmaschine und die Vertikalposition des Fernrohrs 105 durch einen Vertikalabgriff 112 des Theodolits erfasst und verglichen.

- 15 Fig. 2 zeigt den Vorrichtungsaufbau der bekannten Theodolitenprüfmaschine mit einer Vertikalachse 121 und einer Horizontalachse 122. Der Aufbau ist bezüglich der Stabilitätsanforderungen im μ -Bereich dem einer 3-D Koordinatenmessmaschine gleichzusetzen, weshalb als Aufnahme 20 der Achssysteme ein Granitrahmen 123 verwendet wird. Die gesamte Maschine ruht auf einem Betonfundament (nicht dargestellt) und ist in einem klimatisierten Raum aufgestellt. Auf einer Grundplatte 123' des Granitrahmens 123 ist ein einem Präzisionsdrehtisch ähnliches Horizontalmessteil 124, das über 25 Wälzlager 125 gelagert und mittels eines Horizontalantriebs 126 um die Vertikalachse 121 drehbar ist, befestigt. Das Horizontalmessteil 124 besitzt ausserdem einen Horizontalwinkelsensor 127. Auf dem Horizontalmessteil 124 ist ein Dreifuss 129 zur Aufnahme eines zu prüfenden Theodolits 30 montiert. Die elektrische Verbindung für den aufgesetzten Theodolit 130 erfolgt über ein Schleifringsystem (nicht dargestellt). Ein Vertikalmessteil 131 weist eine um die Horizontalachse 122 schwenkbare, über einen Vertikaltrieb 132 antreibbare, einen Vertikalwinkelsensor 133 aufweisende

Messbrücke 134 auf, die einen elektronischen Autokollimator 135 trägt. An der Messbrücke 134 ist ausserdem ein gabelförmiger Mitnehmer 136 angeordnet, der als Anschlag für ein Fernrohr 137 des Theodolits 130 dient. Somit folgt die 5 vertikale Position des Fernrohres 137 weitgehend der des Autokollimators 135. Da der Mitnehmer 136 jedoch ein Spiel gegenüber dem Fernrohr 137 aufweist, sind der Mitnehmer 136 und das Fernrohr 137 bei Feinverstellung der Messbrücke 134 entkoppelt. In gleicher Weise dient der Mitnehmer 136 als 10 Anschlag bei horizontaler Verstellung über das Horizontalmessteil 124. Die Stabilität der schweren Messbrücke 134 ist kritisch, da besonders in horizontaler Position hohe, die Messung eventuell verfälschende Biegemomente auf die Struktur der Messbrücke 134 wirken. Die U-förmige Messbrücke 15 134 ist beidseitig am Granitrahmen 123 über als vorgespannte Kugelbuchsenlager ausgebildete Kippachslager 138 um die Horizontalachse 122 drehbar gelagert. Um diese Kippachslager 138 von radialen Kräften durch das über 12 kg betragende Eigengewicht der Messbrücke 134 und des elektronischen 20 Autokollimators 135 zu entlasten, verfügt die Maschine über ein zusätzliches Gewichtskompensationssystem. Die gesamte Messbrücke 134 wird von einem äusseren Tragrahmen 139, der zugleich auch Gegengewichte 140 trägt und die Antriebskräfte aufnimmt, im Schwerpunkt unterstützt. Dieser Tragrahmen 139 25 dreht sich in eigenen separaten Tragrahmenlagern 141. Die Autokollimationseinstellung erfolgt, indem der Autokollimator 135 der Theodolitenprüfmaschine einen kollimierten Lichtstrahl auf einen planen Aufsatzspiegel 142 projiziert, der auf dem Fernrohr 137 des Theodolits 130 normal zur Richtung der Zielachse des Fernrohrs 137 aufgesetzt ist. Die Befestigung 30 des Aufsatzspiegels 142 auf dem Fernrohr 137 erfolgt durch eine Spannzange (nicht dargestellt). Damit ist es möglich, den Aufsatzspiegel 142 weitgehend normal zur optischen Achse des Fernrohrs 137 und somit zur Zielachse zu montieren. Der

Aufsatzspiegel 142 reflektiert den kollimierten Lichtstrahl in den Autokollimator 135 der Theodolitenprüfmaschine zurück. Der Lichtstrahl trifft im Brennpunkt des Autokollimators 135 auf einen Positionsdetektor (nicht dargestellt), der als eine

5 Quadrantendiode ausgebildet ist, und erzeugt dort einen Lichtfleck. Die Auflösung des Autokollimators 135 beträgt etwa 0,01 mgon. Durch den Horizontalantrieb 126 und den Vertikalantrieb 132, die pulsbreitenmoduliert angesteuerbare 15 V DC Motoren besitzen, wird das Horizontalmesssteil 124 mit

10 dem Theodoliten 130 bzw. die Messbrücke 134 mit dem Autokollimator 135 präzise bewegt, bis sich der Lichtfleck in der Mitte des Positionsdetektors des Autokollimators 135 befindet. Zusätzlich ermöglicht eine mechanische Grob-Feinuntersetzung (nicht dargestellt) im Verhältnis 1:9 die

15 erforderliche Feinstpositionierung des Regelkreises, der den elektronischen Autokollimator 135, einen Rechner (nicht dargestellt) inklusive Regelungssoftware und die mechanischen Antriebe 126 und 132 umfasst. Die Achssysteme des Theodolits 130 und der Theodolitenprüfmaschine sind somit nach der

20 Autokollimationseinstellung im Wesentlichen kollinear. Der Rechner übernimmt die Steuerung des Messablaufs, die Regelung der Zieleinstellung und die Auswertung der Messergebnisse.

Der Verfahrensablauf des Vertikal- und Horizontalmessvorgang

25 wird im Folgenden beschrieben. Die Messbrücke 134 wird vor dem Aufsetzen des zu prüfenden Theodolits 130 in eine etwa horizontale Lage gebracht, sodass sich der Autokollimator 135 ungefähr in der Vertikalposition 100 gon, gemessen vom Zenit, auf den die Vertikalachse 121 weist, befindet. Der Theodolit

30 130 wird auf dem Dreifuss 129 des Horizontalmesssteils 124 mit in Lotrichtung weisender Stehachse fixiert, so dass die Stehachse des Theodolits 130 und die Vertikalachse 121 der Theodolitenprüfmaschine möglichst zusammenfallen, mindestens jedoch kollinear sind. Der plane Aufsatzspiegel 142 wird auf

dem Objektiv des Fernrohrs 137 des Theodolits 130 durch die Spannzange fixiert. Das Fernrohr 137 wird in den gabelförmigen Mitnehmer 136 der Messbrücke 134 eingeschwenkt. Zu Beginn der Messung bewegt sich die Messbrücke 134 auf die vom Zenit aus gemessene Vertikalposition 260 gon, den Beginn des vertikalen Messbereichs. Der Mitnehmer 136 nimmt bei dieser Bewegung das Fernrohr 137 des Theodolits 130 mit. Durch die darauf folgende Autokollimationseinstellung wird der Autokollimator 135 durch präzises Einstellen der Messbrücke 134 und des 5 Horizontalmessteils 124 auf den am Fernrohr 137 fixierten Aufsatzspiegel 142 ausgerichtet. Aufgrund des Spiels zwischen Mitnehmer 136 und Fernrohr 137 wird das Fernrohr 137 während der Autokollimationseinstellung nicht vom Mitnehmer 136 verstellt. Nach dieser Autokollimationseinstellung werden die 10 Winkelwerte des Theodolits 130 und die der Theodolitenprüfmaschine vom Rechner abgefragt und gespeichert. Die Differenz der Vertikalwinkel ist der Fehler des Theodolits 130 für die jeweilige Vertikalposition, hier 260 gon. Die 15 Messung des ersten Messpunktes ist hiermit beendet. Für die Messung des nächsten Messpunktes bewegt der Vertikalantrieb 132 der Theodolitenprüfmaschine die Messbrücke 134 und über den Mitnehmer 136 auch das Fernrohr 137 des Theodolits 130 um etwa 15 gon auf die Vertikalposition 275 gon. Nun beginnt die 20 Messung des zweiten Punktes nach dem oben beschriebenen Schema. Auf diese Art werden Vertikalmessungen bis zur 25 Vertikalposition 140 gon durchgeführt, wobei der Bereich von 380 bis 20 gon nahe des Zenits ausgelassen wird, da in diesem Bereich ein eventueller Versatz der Prüflings- und der Theodolitenprüfmaschinen-Achsen kaum oder nicht durch den 30 Horizontalantrieb 126 der Theodolitenprüfmaschine korrigiert werden kann. Denn die horizontale Bewegung des Lichtflecks auf dem Positionsdetektor des Autokollimators 135 im Verhältnis zu dem Vertikaldrehwinkel ist mit dem Tangens des Winkels zwischen der horizontalen Lage und der tatsächlichen Lage der

Messbrücke 134 verknüpft. Nach Abschluss der Vertikalprüfung wird die Messbrücke 134 in die Vertikalposition 100 gon bewegt und es wird mit der Untersuchung des Horizontalwinkelabgriffs des Theodolits 130 begonnen. Über das Horizontalmessteil 124 wird der Theodolit 130 in eine Richtung gedreht, wobei sich das Unterteil 143 und die Alhidade 144 des Theodolits 130 gemeinsam bewegen, bis das Fernrohr 137 des Theodolits 130 an den Anschlag des gabelförmigen Mitnehmers 136 stösst und festgehalten wird, wodurch die Alhidade 144 stoppt und nur das Unterteil 143 weiterbewegt wird. Ist die gewünschte horizontale Winkelposition des Theodolits 130 erreicht, wird das Horizontalmessteil 124 geringfügig in die Gegenrichtung gedreht, wodurch sich das Fernrohr 137 vom Mitnehmer 136 wegdreht und somit bei der Autokollimationseinstellung kein mechanischer Anschlag den Einregelvorgang behindert. Nach der Autokollimationseinstellung erfolgt die Aufnahme der Messwerte analog zu der Vertikalmessung. Bei der Horizontaluntersuchung werden über den Umfang gleichmäßig verteilt etwa 35 Punkte gemessen. Nach Abschluss des gesamten Horizontal- und Vertikalprüfvganges werden die gespeicherten Winkelpaare ausgewertet.

Diese bekannte Theodolitenprüfmaschine weist zahlreiche Nachteile und Probleme auf, die bisher nicht hinreichend gelöst werden konnten. Da die den Autokollimator tragende Messbrücke vor allem in horizontaler Position hohen Biegemomenten durch das Eigengewicht und das Gewicht des Autokollimators ausgesetzt ist, muss die Messbrücke einen stabilen Aufbau aufweisen, damit eine die Messung verfälschende Verformung der Messbrücke möglichst vermieden wird. Jedoch sollte das Gewicht der Messbrücke nicht zu hoch sein, da im Rahmen der vorgegebenen Toleranzen die Tragfähigkeit der hochpräzisen Kippachslagerung, welche die Messbrücke am Granitrahmen lagert, stark beschränkt ist. Aus

statischen Gründen, insbesondere um Verformungen zu vermeiden und die Kippachslagerung möglichst wenig zu belasten, erscheint eine U-Form mit beidseitiger Kippachslagerung als vorteilhaft, die wiederum einen zweisäuligen Granitrahmen 5 verlangt. Das hohe Gewicht der Messbrücke erfordert zudem aufgrund der beschränkten Tragfähigkeit der als vorgespannte Kugelbuchsenlager ausgebildeten Kippachslager ein aufwendiges Gewichtskompensationssystem, welches das Gesamtgewicht der Theodolitenprüfmaschine weiter erhöht. Der aufgrund der 10 beidseitigen Kippachslagerung erforderliche, die Messbrücke umgebende, massive Granitrahmen, die U-Form der Messbrücke und das Gewichtskompensationssystem schränken die Zugänglichkeit zum zu prüfenden Theodolit stark ein, was insbesondere bei Justierarbeiten und grossen Prüflingen hinderlich ist. Der 15 massive Aufbau und das Gewicht der bekannten Theodolitenprüfmaschine verhindern eine breite Einsatzmöglichkeit, da einerseits Belastungstoleranzen von normalen Industrieböden überschritten werden, andererseits die Theodolitenprüfmaschine nicht durch eine normale Labortüre 20 transportiert werden kann. Wegen der beidseitigen Anordnung der Kippachslager ist aufgrund von statischer Überbestimmtheit ein spannungsfreies, exaktes Justieren der einzelnen Kippachslager höchst problematisch, da ein Verstellen eines Kippachslagers sich auch stets auf das gegenüberliegende 25 Kippachslager auswirkt, womit die hohen Präzisionsanforderungen nur mit grossem Justieraufwand erfüllt werden können. Auch die stabile Montage des Aufsatzspiegels auf dem Fernrohr ist kritisch, da Abweichungen von der Spiegelebene zur Zielachse möglichst zu vermeiden sind und 30 eine exakte Ausrichtung des Aufsatzspiegels einen grossen Aufwand bedarf. Unterschiedliche Fernrohrgeometrien und Theodolitenbaureihen erfordern unterschiedliche Aufsatzspiegel-Spannzangen. Da die Referenzstruktur für den gesamten Messablauf von dem Aufsatzspiegel gebildet wird, kann

lediglich eine Überprüfung der Winkelsensoren und der Achsen des Theodolits erfolgen. Fehler in der Fernrohr-Optik bleiben somit unberücksichtigt. Mittels des eingesetzten Autokollimators ist lediglich die Ausrichtung des

- 5 Aufsatzspiegels detektierbar, nicht jedoch die Lage und Qualität einzelner Strukturen der Fernrohr-Optik, wie beispielsweise die Qualität bzw. Ausrichtung einzelner Linsen, eines Teilerwürfels, einer Bildaufnahmefläche oder des Tubusablaufs. Eine Überprüfung eines eventuell im Theodolit integrierten Laserdistanzmessers kann nicht stattfinden, da 10 der Aufsatzspiegel die Fernrohroptik verdeckt. Auch der Neigungsmesser im Theodolit ist mit der bekannten Theodolitenprüfmaschine nicht kalibrierbar. Die Entwicklung neuer und noch präziserer Theodoliten verlangt zudem nach 15 einer noch höheren Genauigkeit der Theodolitenprüfmaschine.

In der SU 763682 A wird eine manuell zu bedienende Vorrichtung zum Überprüfen eines geodätischen Geräts, das insbesondere eine um eine Drehachse in einer Vertikalebene kippbare Visiervorrichtung aufweist, offenbart. Ein feststehender Eichkollimator grosser Brennweite mit einem Okularmikrometer ist auf einem Gestell, das sich auf einem Tisch befindet, so positioniert, dass die Kollimatorachse mit der Drehachse der Visiervorrichtung - der Kippachse - des zu untersuchenden 20 Geräts, das ebenfalls auf dem Tisch aufgestellt ist, übereinstimmt. Das zu untersuchende Gerät kann mittels einer drehfesten Hubvorrichtung geneigt und horizontal ausgerichtet werden. Zwischen dem Eichkollimator und dem zu untersuchenden Gerät ist ein einseitig gelagerter, als Messbügel zur 25 Vertikalwinkelprüfung wirkender Drehblock angeordnet, dessen Drehachse mit der Kollimatorachse - und somit insbesondere mit der Kippachse des zu untersuchenden Geräts - zusammenfällt und der eine Durchgangsöffnung für den Durchgang von Kollimator- 30 Strahlenbündeln aufweist. Der mit mehreren Gegengewichten

ausgestattete schwere Drehblock umfasst ein optisches System, welches das Strahlenbündel derart umlenkt, dass es zuerst um einen bestimmten Versatz parallel versetzt wird, der nicht kleiner ist als die Aussenabmessung des grössten zu 5 überprüfenden Gerätes, und welches anschliessend das parallel versetzte Strahlenbündel um 90° in der Ebene des parallelen Versatzes umlenkt, wobei die Umlenkung mittels eines Pentaprismas im Schnittpunkt der Achse des verschobenen Bündels mit der Vertikalebene der kippbaren Visiervorrichtung 10 des zu untersuchenden Geräts erfolgt. Auf der ersten reflektierenden Fläche des optischen Systems des Drehblocks ist eine kleine Öffnung vorgesehen, durch welche ein Teil des Kollimator-Strahlenbündels ohne Reflexion oder Ablenkung hindurch treten kann. Der Drehblock ist mit einem hochgenauen 15 Limbus und einer Winkelablesevorrichtung ausgestattet. Handelt es sich bei dem zu untersuchenden Gerät um einen Theodolit, so ist es mittels der Vorrichtung durch Schwenken des Drehblocks möglich, die Vertikalwinkelmessvorrichtung des Theodolits zu überprüfen und eine mathematische Fehlerkorrekturfunktion zu 20 bilden. Eine Horizontalwinkelkorrektur ist aufgrund des feststehenden Theodolits lediglich durch Durchschlagen des Theodolitfernrohrs für maximal vier Horizontalwinkel möglich, so dass keine Erzeugung einer kontinuierlichen Horizontalwinkelkorrekturfunktion realisierbar ist. Das 25 Ausrichten des Theodolitfernrohrs auf den Drehblock und umgekehrt erfolgt, indem der Benutzer mit dem Auge entweder das Kollimatornetz im Theodolitfernrohr oder das Theodolitnetz im Kollimatorfernrohr betrachtet und die Achse händisch verstellt. Die Kalibrierung der gesamten Vorrichtung wird mit 30 Hilfe des Autokollimatorokulars des Kollimators vorgenommen, indem ein Eichprisma oder ein Polygonspiegel auf dem Tisch angeordnet wird und bei unterschiedlichen Stellungen des Drehblocks die Konstanz der Lage der optischen Achse der Vorrichtung gemessen wird. Da die Vorrichtung eine nicht

drehbare Aufnahmeverrichtung für den Theodolit aufweist, ist es nicht möglich, innerhalb eines Messvorgangs mehrere Horizontalwinkel zu überprüfen. Somit ist es nicht möglich, eine aus einer Vielzahl von Horizontalwinkelmessungen

- 5 gewonnene Korrekturfunktion zu ermitteln und diese im elektronischen Theodolit zur automatischen Fehlerkorrektur zu speichern. Da lediglich das Kollimatornetz oder das Theodolitnetz als Bezug für die Überprüfung dient, ist es nicht möglich, einzelne Strukturen, beispielsweise
- 10 Linsenoberflächen, Teilerwürfel, Bildaufnahmefläche, oder einen Laserdistanzmesser in der Ausrichtung und Lage zu prüfen oder zu kalibrieren. Da bei dieser Vorrichtung der Eichkollimator weit entfernt vom zu untersuchenden Gerät so angeordnet ist, dass die Kollimatorachse mit der Drehachse
- 15 oder Kippachse des Geräts zusammenfällt, muss ein aufwendiges und fehleranfälliges Strahlführungssystem mit mehreren Spiegeln im Drehblock angeordnet sein. Hierdurch wird einerseits die Torsions- und Biegefestigkeit des Drehblocks verringert, als auch das Gewicht des Drehblocks und der
- 20 gesamten Vorrichtung erhöht, da schwere Gegengewichte erforderlich sind. Folglich ist es mit dem offenbarten Gerät systembedingt nicht möglich, höchste Genauigkeitsanforderungen bis unter 0,5" bzw. 0,15 mgon zu erfüllen. Jedoch zeichnet sich die Vorrichtung durch eine leichte Zugänglichkeit des zu
- 25 überprüfenden Geräts aus, da von drei Seiten auf das Gerät zugegriffen werden kann. Die Möglichkeit zur Durchführung eines vollautomatischen Kalibrierprozesses mit der offenbarten Vorrichtung besteht nicht.
- 30 Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein universell einsetzbares Prüfverfahren zu schaffen, mittels welchem die Winkelausrichtung und die Qualität einzelner Referenzstrukturen unterschiedlichster hochgenauer Prüflinge, vorzugsweise geodätischer Messinstrumente, zuverlässig und

höchstgenau automatisch geprüft oder kalibriert werden kann, und die Nachteile der gattungsgemäßen Prüfverfahren zu beheben.

- 5 Diese Aufgabe wird durch die Verwirklichung der Merkmale des unabhängigen Anspruchs gelöst. Merkmale, die die Erfindung in alternativer oder vorteilhafter Weise weiterbilden, sind den abhängigen Ansprüchen zu entnehmen.
- 10 Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, dass durch ein direktes Messen an einer Referenzstruktur des Prüflings wesentliche Verbesserungen gegenüber dem Stand der Technik erzielt werden können.
- 15 Im Folgenden wird das erfindungsgemäße Verfahren teilweise unter Zuhilfenahme von Vorrichtungsbeschreibungen allgemein beschrieben. Mögliche konkrete beispielhafte Ausführungsformen sind im Anschluss den Figuren und der Figurenbeschreibung zu entnehmen.
- 20 Eine mögliche Vorrichtung zum Prüfen oder Kalibrieren der winkelabhängigen Ausrichtung einer Referenzstruktur eines hochpräzisen Prüflings weist einen Sockel als stabile Bezugsbasis für den Prüf- oder Kalibriervorgang auf. Dieser Sockel ist als ein Steinkörper, Metallkörper oder als ein, aus mindestens einem anderen geeigneten Material gefertigter oder - beispielsweise aus Streben - zusammengesetzter Körper, der als Bezugsbasis dient, ausgebildet. Der Sockel weist beispielsweise eine L-förmige Grundstruktur auf. Ein Aufnahmeteil zur Aufnahme des Prüflings ist gegenüber dem Sockel um eine - insbesondere in Lotrichtung verlaufende - Aufnahmeteil-Achse über ein Hochpräzisionslager drehbar gelagert. Das Aufnahmeteil ist beispielsweise als Präzisionsdrehtisch mit einer - gegebenenfalls mittels eines
- 25
- 30

Dreifusses einstellbaren - Halterung zum Halten des Prüflings ausbildbar. Ein Verdrehwinkel des Aufnahmeteils gegenüber dem Sockel um die Aufnahmeteil-Achse, im Folgenden als Aufnahmeteil-Verdrehwinkel bezeichnet, ist z.B. mittels eines Winkel-Encoders mit dynamischem oder statischem Winkelabgriff hochpräzise messbar. Sofern eine exakte absolute vertikale Ausrichtung des Aufnahmeteils oder der Halterung zum Prüfen oder Kalibrieren erforderlich ist, ist es weiters möglich, einen Neigungssensor in das Aufnahmeteil zu integrieren.

Ausserdem ist es realisierbar, Mittel zum Neigen des Aufnahmeteils oder des gesamten Sockels einzusetzen. Diese Mittel zum Neigen können entweder zum exakten vertikalen Ausrichten insbesondere des Aufnahmeteils oder des Prüflings, oder zum Prüfen eines Neigungssensors des Prüflings verwendet werden. Bei elektronischen Prüflingen, die eine Spannungsversorgung benötigen oder Messwerte übertragen, ist das drehbar gelagerte Aufnahmeteil ausserdem gegebenenfalls mit Mitteln zur elektrischen Verbindung, beispielsweise einem Schleifring- oder Rollringsystem, ausgestattet, um eine elektrische Verbindung zwischen dem Sockel und dem Prüfling zu ermöglichen. Selbstverständlich können stattdessen auch Funkübertragungssysteme - beispielsweise Bluetooth -, Infrarotsysteme oder dergleichen Systeme eingesetzt werden.

Die Vorrichtung umfasst ausserdem ein Messteil, das gegenüber dem Sockel um eine die Aufnahmeteil-Achse rechtwinklig schneidende Messteil-Achse drehbar gelagert ist. Dabei ist ein Messteil-Verdrehwinkel um die Messteilachse z.B. mittels eines Winkel-Encoders mit dynamischem oder statischem Winkelabgriff hochpräzise messbar. Die Grundform des Messteils ist so ausgebildet, dass das Messteil den Prüfling durch eine im Wesentlichen spiegel- oder achssymmetrische - beispielsweise zangenartige - Ausbildung in Bezug auf die Messteilachse von mindestens zwei Seiten umgreift oder durch eine im

Wesentlichen rotationssymmetrische Ausbildung vollumfänglich umschliesst.. Das Messteil ist zumindest in einem bestimmten Winkelbereich unabhängig vom Prüfling verdrehbar. Eine derartige umgreifende oder umschliessende, zumindest teilweise symmetrische Ausbildung des Messteils hat mehrere Vorteile.. Da der Schwerpunkt des Messteils nahe oder auf der Messteilachse liegt, kann eine zusätzliche Gewichtskompensation entfallen. Hierdurch wird der Antrieb des Messteils entlastet, die Biege- und Torsionsbelastung erheblich reduziert und somit die Messgenauigkeit aufgrund geringerer Toleranzen drastisch erhöht. Ein weiterer Vorteil eines derartigen Messteilaufbaus besteht in der Möglichkeit, mehrere Messkomponenten innerhalb der Messebene des Messteils - insbesondere auf gegenüberliegenden Seiten in Bezug auf den Prüfling - anzuordnen. Hierdurch wird die Realisierung zahlreicher neuer Messverfahren möglich, durch welche die Messgenauigkeit weiter erhöht werden kann.

Auf dem Messteil ist mindestens eine Optikeinheit mit einem optischen Detektor angeordnet. Die Optikeinheit dient zum Empfangen mindestens eines mit der Referenzstruktur des Prüflings in Wechselwirkung stehenden Prüflings-Strahlenbündels, das im Wesentlichen in einer von der Messteil-Achse senkrecht durchstossenen Messebene, in der die Aufnahmeteil-Achse liegt, verläuft. Hierdurch erzeugt das Prüflings-Strahlenbündel mindestens einen Punkt auf dem Detektor. Das Prüflings-Strahlenbündel kann entweder direkt, eventuell geformt durch ein Linsensystem, auf den Detektor treffen, oder über ein optisches Umlenkelement, beispielsweise eine Spiegelungseinheit oder einen Lichtleiter, in Richtung der Optikeinheit und des Detektors umgelenkt oder geleitet werden und indirekt auf den Detektor treffen. Bei Einsatz eines solchen optischen Umlenkelements ist es möglich, die Optikeinheit ausserhalb der Messebene, eventuell auf einem

Teilelement des Messteils, anzuordnen. Unter dem mit der Referenzstruktur des Prüflings in Wechselwirkung stehenden Prüflings-Strahlenbündel ist allgemein ein Strahlenbündel, beispielsweise ein Lichtstrahlenbündel, zu verstehen, das direkt oder indirekt in einer Wechselwirkung mit mindestens einer Referenzstruktur des Prüflings steht und/oder von einem solchen Teil kommt. Die Wechselwirkung zwischen dem Prüflings-Strahlenbündel und der Referenzstruktur erfolgt beispielsweise durch Reflexion, Streuung, Brechung, Strahlformung,
5 Abblendung, Filterung oder Strahlerzeugung.
10

Mit dem Begriff „Prüfling“ ist ein zu prüfendes oder justierendes Element als Ganzes gemeint, beispielsweise ein geodätisches Messinstrument, eine polygonale Spiegeleinheit
15 oder ein mechanisches Hochpräzisionsteil, ohne allfällige zur Durchführung des Messvorgangs montierte Hilfskomponenten wie beispielsweise ein Aufsatzspiegel. Mit der Referenzstruktur ist eine Struktur des Prüflings gemeint, die konkret bezüglich der Winkelausrichtung oder ihrer Qualität zu prüfen ist. Dies
20 kann beispielsweise ein Körper, eine Fläche, eine Kante oder ein Punkt sein. Bei einem Prüfling mit einer gegenüber einer Grundfläche exakt auszurichtenden oder ausgerichteten Spiegelfläche wird die Referenzstruktur beispielsweise durch diese Spiegelfläche gebildet. Bei einem als Theodoliten
25 ausgebildeten Prüfling stellt die Referenzstruktur des Prüflings beispielsweise ein Teil des horizontal und vertikal dreh- bzw. kippbaren Fernrohrs dar.

Sowohl das Aufnahmeteil, als auch das Messteil sind
30 vorzugsweise elektromotorisch antreibbar. Somit bildet der Empfangsbereich der Optikeinheit, bezogen auf den Prüfling, - durch Verstellen von Aufnahmeteil und Messteil um die Aufnahmeteil-Achse bzw. die Messteil-Achse - einen den Prüfling zumindest teilweise umschliessenden Abschnitt einer

Kugeloberfläche. Sofern die Aufnahmeteil-Achse in Lotrichtung weist und somit die Messteil-Achse in der Horizontalebene liegt, kann über das Aufnahmeteil ein Horizontalwinkel und über das Messteil ein Vertikalwinkel verstellt werden.

5

Die drehbare Lagerung des Messteils gegenüber dem Sockel erfolgt mittels einer Messteil-Lagereinheit, die vorzugsweise als ein Luflager ausgebildet ist, das auf einer einzigen Seite der Messebene oder in der Messebene angeordnet ist. Da nur eine Lagereinheit zum Einsatz kommt, kann diese Lagereinheit hochpräzise justiert werden, ohne dass es aufgrund von statischer Überbestimmtheit zu Verspannungen mit einer zweiten, auf der anderen Seite der Messebene bzw. ausserhalb der Messebene angeordneten Lagereinheit kommt.

10 Hierdurch ist es möglich, aussergewöhnlich hohe Messgenauigkeiten zu erreichen. Aufgrund der einseitigen, auf einer einzigen Seite der Messebene liegenden oder mittigen, in der Messebene liegenden Anordnung der Lagereinheit ist es möglich, einen kompakteren, insbesondere schmäleren Aufbau der gesamten Messvorrichtung zu realisieren und eine wesentlich bessere Zugänglichkeit zum Prüfling zu schaffen, wobei aufgrund der Eigenschaften eines Luflagers die Messgenauigkeit der gesamten Vorrichtung sogar noch erhöht wird. Unterschiedliche Ausbildungen von radialen und axialen 15 Luftlagern, Zylinder-, U-, Winkel- oder Plan-Luflagern sind mittlerweile aus dem Stand der Technik bekannt. Das Luflager muss dermassen beschaffen sein, dass eine hochpräzise Lagerung des Messteils um die Messteil-Achse unter Berücksichtigung der geforderten Toleranzen der Vorrichtung bei den auf das Lager 20 wirkenden Kräfte gewährleistet ist und sowohl die Steifigkeit, als auch die Dämpfung den Anforderungen entspricht. Die Auslegungskriterien von Luflagern sind ebenfalls aus dem Stand der Technik bekannt. Unter der als Luflager ausgebildeten Lagereinheit ist sowohl ein Einzellager, als

auch eine Anordnung mehrerer - insbesondere verspannter - Lager in Form einer Lagereinheit zu verstehen.

Selbstverständlich ist es möglich, anstelle eines Luflager ein konventionelles Gleit- oder Wälzlagern oder eventuell ein

- 5 Magnetlager zu verwenden. Teilweise können in diesen Fällen jedoch nicht derart geringe Toleranzen wie bei einem Luflager erzielt werden.

- Ausserdem ist es möglich, auch das Hochpräzisionslager des
10 Aufnahmeteils als ein Luflager auszubilden.

Gegebenenfalls ist das Messteil so ausgebildet, dass außer der Optikeinheit auf derjenigen Seite des Messteils, die der Optikeinheit bezüglich der Messteil-Achse gegenüber liegt,

- 15 eine Zusatzoptikeinheit angeordnet ist. Diese Zusatzoptikeinheit ist z.B. als ein Zusatz-Emitter, ein Zusatz-Spiegel, eine Zusatz-Autokollimator oder eine Zusatz-Kamera ausbildbar. Mögliche Ausführungsformen des Messteils sind der Beschreibung der Figuren zu entnehmen.

- 20 Eine Steuerungs-Regelungs-Einheit übernimmt die Steuerung der Vorrichtung, insbesondere das motorische Ausrichten der Optikeinheit gegenüber der Referenzstruktur des Prüflings mittels motorischem Einstellen des Aufnahmeteils und des
25 Messteils in Abhängigkeit von der Lage des mindestens einen vom Prüflings-Strahlenbündel hervorgerufenen Punktes auf dem Detektor, insbesondere auch oder alternativ in Abhängigkeit von einem Signal einer Zusatz-Optikeinheit. Gegebenenfalls werden erfasste Messdaten, insbesondere die der Winkel-
30 Encoder, gespeichert und/oder ausgewertet. Die Steuerungs-Regelungs-Einheit ist beispielsweise als ein Personalcomputer mit entsprechenden Schnittstellen, ein Verbund von Steuerungen oder intelligenten Sensoren und Aktoren, eine SPS oder ein mit einem Datennetz verbundenes Rechnersystem ausbildbar.

Vor allem bei Prüflingen, deren bezüglich Ihrer Winkelausrichtung zu prüfende oder kalibrierende Referenzstruktur gegenüber dem restlichen Prüfling verstellbar

5 ist, wie dies beispielsweise bei einem Theodolit, dessen Winkel-Encoder zu prüfen sind, der Fall ist, kommt zum verstellen der Referenzstruktur, beispielsweise des Theodolitfernrohrs, ein Handhabungsroboter, der z.B. auf dem Sockel angeordnet ist, zum Einsatz. Somit ist es möglich, die 10 Referenzstruktur und die Optikeinheit des Messteils simultan zu verstellen und Winkelabweichungen - insbesondere eines Winkel-Encoders des Prüflings - innerhalb einer kurzen Prüfzeit zu ermitteln.

15 Zum Prüfen des thermischen Verhaltens eines Prüflings kann ein thermischer Strahler eingesetzt werden, der derart angeordnet ist, dass der Prüfling zumindest von einer Seite erwärmt werden kann, wodurch beispielsweise der Einfluss einer Sonnenbestrahlung und der damit verbundene thermische Verzug 20 simulierbar ist.

Bei dem erfindungsgemässen Verfahren wird eine Strahlung von der Referenzstruktur des Prüflings erzeugt oder bezüglich 25 eines Strahlungsparameters - insbesondere durch Reflexion, Abblendung, Filterung oder Formung - verändert. Diese erzeugte oder veränderte Strahlung bildet das oben beschriebene Prüflings-Strahlenbündel.

30 Zur Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens ist es entweder möglich, im Wesentlichen die oben beschriebene Vorrichtung zu verwenden, oder es kommt allgemein folgende Vorrichtung zum Einsatz: Die Vorrichtung weist ein verstellbares oder fixiertes Aufnahmeteil zur Aufnahme des

Prüflings und ein verstellbares Messteil auf, wobei das Messteil und das Aufnahmeteil relativ zueinander um eine Aufnahmeteil-Achse und eine die Aufnahmeteil-Achse rechtwinklig schneidende Messteil-Achse drehbar sind. Ein

5 Aufnahmeteil-Verdrehwinkel um die Aufnahmeteil-Achse und ein Messteil-Verdrehwinkel um die Messteil-Achse sind zwischen dem Messteil und dem Aufnahmeteil messbar. Die Vorrichtung besitzt weiters eine auf dem Messteil angeordnete Optikeinheit mit einem optischen Detektor zum Empfangen mindestens eines mit

10 dem Prüfling in Wechselwirkung stehenden Prüflings-Strahlenbündels, das im Wesentlichen in einer von der Messteil-Achse senkrecht durchstossenen Messebene, in der die Aufnahmeteil-Achse liegt, verläuft und auf dem Detektor mindestens einen Punkt erzeugt. Selbstverständlich ist es

15 möglich, dass die Optikeinheit mit dem Detektor nicht direkt auf dem Messteil angeordnet ist, sondern auf einem anderen Teil, wobei auf dem Messteil Mittel zur Umlenkung des Prüflings-Strahlenbündels zum Detektor vorgesehen sind.

Ausserdem umfasst die Vorrichtung eine Steuerungs-Regelungs-

20 Einheit zumindest zum motorischen Ausrichten der Optikeinheit gegenüber der Referenzstruktur des Prüflings mittels motorischem Einstellen des Aufnahmeteil-Verdrehwinkels und des Messteil-Verdrehwinkels in Abhängigkeit von der Lage des mindestens einen Punktes auf dem Detektor. Für eine genauere

25 Beschreibung der Einzelemente dieser Vorrichtung sei hiermit auf die Beschreibung der bekannten Theodolitenprüfmaschine und der oben beschriebenen Vorrichtung verwiesen.

Selbstverständlich kann das beschriebenen Verfahren auch mit einer anders aufgebauten, jedoch im Wesentlichen äquivalenten

30 Vorrichtung zur Anwendung kommen.

Bei dem erfindungsgemässen Verfahren wird zunächst der Prüfling auf dem Aufnahmeteil angeordnet. Anschliessend folgt

ein Vor-Ausrichten der Optikeinheit und/oder der Referenzstruktur des Prüflings, so dass das Prüflings-Strahlenbündel zumindest teilweise auf den Detektor trifft und dort den mindestens einen Punkt erzeugt. Nach dem Auswerten der Lage dieses mindestens einen Punktes auf dem Detektor, insbesondere durch die Steuerungs-Regelungs-Einheit, erfolgt ein Fein-Ausrichten der Optikeinheit gegenüber der Referenzstruktur über die Steuerungs-Regelungs-Einheit in Abhängigkeit von der Lage des mindestens einen Punktes auf dem Detektor, so dass der mindestens eine Punkt eine bestimmte Solllage erreicht. Daraufhin folgt ein Erfassen zumindest des Aufnahmeteil-Verdrehwinkels und/oder des Messteil-Verdrehwinkels. Das genannte Prüflings-Strahlenbündel wird von einer Strahlung gebildet, die von der Referenzstruktur des Prüflings erzeugt oder von dieser bezüglich eines Strahlungsparameters, beispielsweise durch Reflexion, Streuung, Brechung, Abblendung, Filterung oder Formung, verändert wird. Die Erzeugung der Strahlung erfolgt über einen Emitter, der beispielsweise als Temperatur- oder Lumineszenzstrahler, als chemischer oder radioaktiver Strahler ausgebildet ist. Da das Prüflings-Strahlenbündel, das auf den Detektor trifft, somit direkt oder indirekt von der Referenzstruktur des Prüflings kommt und nicht von einer Hilfskomponente wie beispielsweise einem Vorsatzspiegel herrührt, kann die Referenzstruktur höchst präzise gegenüber der Optikeinheit - bzw. umgekehrt - ausgerichtet werden, da Fehler durch eine mangelhafte Ausrichtung der Hilfskomponente gegenüber der Referenzstruktur vermieden werden. Außerdem ist es möglich, Referenzstrukturen - beispielsweise in Form einer beleuchteten oder selbst leuchtenden Marke - zu wählen, die mechanisch nur schwierig koppelbar sind, insbesondere Komponenten, die optisch detektierbar innerhalb eines Linsensystems angeordnet sind. Dies sind beispielsweise

Linsen, Strichplatten, Teilerwürfel oder eine Bildaufnahmefläche innerhalb eines Linsensystems.

Dieses erfindungsgemäße Verfahren eignet sich unter anderem

- 5 zum Prüfen oder Kalibrieren eines mit einer optischen Zieleinheit - insbesondere einem Fernrohr - ausgestatteten Prüflings, vorzugsweise einen Theodolit, einen Nivellier oder einen geodätischen Scanner, wobei die optische Zieleinheit um eine Stehachse und gegebenenfalls eine Kippachse verstellbar
- 10 ist. Ein Stehachs-Verdrehwinkel und gegebenenfalls ein Kippachs-Verdrehwinkel sind hierbei erfassbar. Die optische Zieleinheit bestimmt eine Zielachse und weist eine optisch detektierbare Marke, beispielsweise eine Strichplatte oder einen Leuchtaustritt, auf. Ein Prüflings-Unterteil ist auf dem
- 15 Aufnahmeteil so angeordnet, dass die Aufnahmeteil-Achse gegenüber der Stehachse und gegebenenfalls die Messteil-Achse gegenüber der Kippachse im Wesentlichen kollinear verlaufen. Vor, während oder nach dem oben erwähnten Vor-Ausrichten der Optikeinheit erfolgt ein Vor-Ausrichten der Zieleinheit des
- 20 Prüflings. Durch Erfassen des Stehachs-Verdrehwinkels und/oder gegebenenfalls des Kippachs-Verdrehwinkels des Prüflings kann mittels Vergleichen mit dem Aufnahmeteil-Verdrehwinkel bzw. dem Messteil-Verdrehwinkel der Vorrichtung das Prüfen oder Kalibrieren des Prüflings erfolgen.

25

- Die Strahlung wird in einer möglichen allgemeinen Ausführungsform von einem in der Optikeinheit angeordneten Emitter erzeugt. Die Optikeinheit besitzt hierbei neben dem Emitter einen Detektor und ein Linsensystem zum Formen der vom
- 30 Emitter ausgesandten Strahlung und zum Fokussieren des Prüflings-Strahlenbündels auf den Detektor. Das Linsensystem weist bevorzugt eine variable Brennweite auf. Dabei fällt die geformte Strahlung auf eine bezüglich der Ausrichtung zu prüfende Reflexionsfläche, die von der Referenzstruktur des

Prüflings gebildet wird, und wird von dieser reflektiert. Die von der Referenzstruktur reflektierte Strahlung bildet das Prüflings-Strahlenbündel, das bei entsprechender Ausrichtung der Referenzstruktur gegenüber der Optikeinheit von dem Linsensystem geformt wird, somit zumindest teilweise auf den Detektor trifft und bei exakter Ausrichtung mindestens einen Punkt auf einer bestimmten Solllage auf dem Detektor erzeugt. Die reflektierende Referenzstruktur wird eventuell - sofern erforderlich - mit einer reflexionsverstärkenden Beschichtung oder Folie beschichtet. Als Emitter wird beispielsweise eine LED eingesetzt, deren Strahlung über einen Lichtwellenleiter in die Brennebene des Linsensystems eingespeist wird. Als Detektor ist - abhängig von Anwendungsfall - eine Quadrantendiode, ein CCD Bildsensor oder ein anderer aus dem Stand der Technik bekannter Detektor verwendbar. Handelt es sich bei der als Reflexionsfläche dienenden Referenzstruktur um eine ebene Fläche, wird die vom Emitter ausgesandte Strahlung vom Linsensystem der Optikeinheit vorzugsweise kollimiert, so dass das Prüflings-Strahlenbündel ebenfalls kollimiert ist. Bei einer konvexen oder konkaven Referenzstruktur, die beispielsweise von einer Linsenoberfläche des Prüflings gebildet wird, wird die Strahlung vom Linsensystem der Optikeinheit hingegen entsprechend der Wölbung, insbesondere des Radius, geformt, insbesondere fokussiert oder gestreut. Soll eine antireflexionsbeschichtete Linse als Referenzstruktur dienen, ist der Einsatz von zusätzlichen optischen Filtern im Strahlengang der Strahlung vorteilhaft. Handelt es sich bei der Referenzstruktur um eine Linse innerhalb eines Linsensystems, beispielsweise eine bestimmte Linse innerhalb einer Zieleinheit, kann ebenfalls der Einsatz von optischen Filtern zweckdienlich sein.

Ebenfalls ist es möglich, dass die Referenzstruktur durch eine optisch detektierbare Marke am Prüfling oder innerhalb des Prüflings gebildet wird, wie beispielsweise eine Strichplatte in der Optik der Zieleinheit des Prüflings, wobei die

5 Strahlung bezüglich eines Strahlungspараметers verändert wird. Dies geschieht insbesondere, indem eine Stichplatte seitens des Objektivs oder des Okulars der optischen Zieleinheit des Prüflings durch einen Emitter - gegebenenfalls unter Einsatz optischer Filter - zumindest während des Fein-Ausrichtens der

10 vorrichtung beleuchtet wird, wobei diese Beleuchtung die Strahlung bildet. Hierbei wird die Strichplatte über das Objektiv der Zieleinheit auf den Detektor der Optikeinheit abgebildet, wodurch der mindestens eine Punkt auf dem Detektor erzeugt wird. Der Emitter kann hierbei entweder ebenfalls in

15 der Optikeinheit oder separat untergebracht sein, beispielsweise in einer Zusatzoptikeinheit, die sich auf derjenigen, der Optikeinheit bezüglich der Messteil-Achse gegenüberliegenden Seite des Messteils befindet.

20 Weiters ist es realisierbar, auf einen Emitter ausserhalb der optischen Zieleinheit des Prüflings zu verzichten. Dies kann vor allem dann geschehen, wenn die Strichplatte selbst die Strahlung erzeugt, oder wenn die Strichplatte durch einen in

25 der optischen Zieleinheit angeordneten Emitter beleuchtet wird. Die Abbildung der Strichplatte auf den Detektor erfolgt vorzugsweise über das Objektiv, oder über das Okular. Selbstleuchtende Strichplatten, z.B. in Form eines Lumineszenzstrahlers, sind aus dem Stand der Technik bekannt.

30 Handelt es sich bei dem Prüfling um einen Videotheodolit, so ist es möglich, dass die Referenzstruktur von der Bildaufnahmefläche des Theodolits, insbesondere des CCD-Chips, gebildet wird, wodurch die Orientierung und eine allfällige

Fehlausrichtung der Bildaufnahmefläche messbar sind. Weiters ist die Kamerakonstante überprüfbar.

Auch der Teilerwürfel in einem Theodolitfernrohr kann als
5 Referenzstruktur dienen, wodurch mittels des Verfahrens auch die korrekte Winkelausrichtung eines Teilerwürfels überprüfbar ist.

Sofern ein Laserdistanzmesser im Prüfling angeordnet ist, kann
10 das Prüflings-Strahlenbündel von einem vom Prüfling emittierten Lasermessstahl gebildet werden. Die Referenzstruktur wird somit von der Laserdiode gebildet. In diesem Fall ist es möglich, eine Ausrichtung der optischen Achse des Prüflings mit der Ausrichtung der Achse des
15 Lasermessstrahls zu vergleichen und eine allfällige Ablage zu detektieren.

Ausserdem können Fehler innerhalb des optischen Systems der Zieleinheit festgestellt werden, indem über einen seitens des
20 Okulars oder des Objektivs der Zieleinheit des Prüflings angeordneten Emitter eine Struktur mindestens eines Teils der Zieleinheit auf den Detektor abgebildet wird. Bei einem fokussierbaren optischen System ist es mittels des beschriebenen Verfahrens zudem möglich, den Gang der
25 Fokussierlinse zu untersuchen.

Durch den Einsatz einer Zusatz-Optikeinheit, die auf der Seite des Okulars angeordnet ist, ergeben sich weitere Möglichkeiten. Die Zusatzoptikeinheit kann, wie die
30 Optikeinheit, als ein Autokollimator oder eine Kamera zur Erfassung der Ausrichtung gegenüber einer Referenzstruktur, die von dem Okular selbst oder von einer von der Seite des Okulars detektierbaren Struktur gebildet wird, ausgebildet sein. Alternativ ist die Zusatz-Optikeinheit als ein Zusatz-

Emitter ausgebildet, der ein Strahlenbündel, das bestimmte optische Eigenschaften - insbesondere eine räumliche Strukturierung in Form eines bestimmten Musters - aufweist, emittiert. Dieses Strahlenbündel wird nach einer
5 Wechselwirkung mit mindestens einer Referenzstruktur des Prüflings von der gegenüberliegenden Optikeinheit in Form des Prüflings-Strahlenbündels erfasst. Durch Vergleich der optischen Eigenschaften - insbesondere der Strukturierungen - des von der Zusatz-Optikeinheit ausgesendeten Strahlenbündels
10 und des von der Optikeinheit empfangenen Prüflings-Strahlenbündels werden allfällige optische Fehler in der optischen System des Prüflings, beispielsweise eine unzureichende optische Fernrohrqualität, allfällige Linsenfehler, Verzerrungen oder Verzeichnungen und
15 Fokussierungsfehler, erfasst.

Im Folgenden wird das erfindungsgemäße Verfahren teilweise anhand von Vorrichtungen rein beispielhaft in Form von konkreten Ausführungsbeispielen unter Zuhilfenahme von Figuren
20 genauer beschrieben. In der Figurenbeschreibung wird teilweise auf Bezugszeichen bereits zuvor beschriebener Figuren zurückgegriffen. Im Einzelnen zeigen

Fig. 3 eine Darstellung einer Ausführungsform der Vorrichtung
25 zum Prüfen oder Kalibrieren der winkelabhängigen Ausrichtung einer Referenzstruktur eines hochpräzisen Prüflings mit einer einseitig gelagerten Messwippe als Messteil;

30 Fig. 4 eine vereinfachte Ausschnittsdarstellung einer ersten alternativen Ausführungsform der Vorrichtung mit einer einseitig gelagerten Messwippe als Messteil und einem Handhabungsroboter;

Fig. 5 eine vereinfachte Ausschnittsdarstellung einer zweiten alternativen Ausführungsform der Vorrichtung mit einer einseitig gelagerten Messwippe als Messteil und einem Handhabungsroboter;

5

Fig. 6 eine vereinfachte Ausschnittsdarstellung einer dritten alternativen Ausführungsform der Vorrichtung mit einem einseitig gelagerten Messrad als Messteil und einem Handhabungsroboter;

10

Fig. 7 eine vereinfachte Ausschnittsdarstellung einer vierten alternativen Ausführungsform der Vorrichtung mit einem mittig, in der Messebene gelagerten Messring als Messteil;

15

Fig. 8 eine schematische Darstellung des Strahlengangs mit einer ebenen Reflexionsfläche als Referenzstruktur des Prüflings;

20 Fig. 9 eine schematische Darstellung des Strahlengangs mit einer konvexen Linse als Referenzstruktur des Prüflings;

25 Fig. 10 eine schematische Darstellung des Strahlengangs mit einer Strichplatte als Referenzstruktur des Prüflings; und

30 Fig. 11 eine schematische Darstellung des Strahlengangs bei Abbildung einer Struktur innerhalb einer optischen Zieleinheit auf den Detektor.

In Fig. 3 ist eine mögliche Ausführungsform einer Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Die Vorrichtung umfasst einen Sockel 2 aus

Granit, der auf einem Gestell 24 ruht. Der Sockel 2 ist aus mehreren Teilelementen zusammengesetzt, die gemeinsam etwa eine L-Form ergeben. Auf dem Sockel 2 befindet sich eine Horizontalmesseinheit 25, die ein Aufnahmeteil 3, welches um eine in Lotrichtung weisende Aufnahmeteil-Achse 4 motorisch hochpräzise drehbar ist, besitzt. Die gesamte Vorrichtung ist durch Verstellen des Gestells 24 so neigbar, dass die Aufnahmeteil-Achse 4 exakt in Lotrichtung weist, wobei mittels eines Neigungssensors (nicht dargestellt) die Neigung überwacht wird. Die drehbare Lagerung des Aufnahmteils 3 erfolgt über eine Aufnahmeteil-Lagereinheit 27, die als ein Luflager ausgebildet ist. Ein Aufnahmeteil-Verdrehwinkel zwischen dem Aufnahmeteil 3 und dem Sockel 2 um die Aufnahmeteil-Achse 4 ist mittels eines ersten Winkel-Encoders (nicht dargestellt) hochpräzise messbar. Ein Prüfling 1 in Form eines Theodoliten mit einer optischen Zieleinheit 18 in Form eines Fernrohrs, das um eine Stehachse 20 elektromotorisch drehbar und um eine Kippachse 21 elektromotorisch kippbar ist, wird mit seinem Prüflings-Unterteil 19 auf dem Aufnahmeteil 3 mittels eines Schnellverschlusses 26 fixiert, wobei die Stehachse 20 des Prüflings 1 mit der Aufnahmeteil-Achse 4 zusammenfällt. Auf dem Sockel 2 ist ausserdem ein Messteil 5 in Form eines Messbügels drehbar angeordnet, das eine U-Form aufweist und die Aufnahmeteil-Achse 4 in der dargestellten Ausgangsstellung zangenartig umgreift. Dieses Messteil 5 wird axial und radial von einer als Luflager ausgebildeten Messteil-Lagereinheit 6 gelagert. Das Messteil 5 ist gegenüber dem Sockel 2 um eine Messteil-Achse 7 hochpräzise motorisch drehbar, wobei ein Messteil-Verdrehwinkel um die Messteil-Achse 7 zwischen dem Messteil 5 und dem Sockel 2 mittels eines zweiten Winkel-Encoders (nicht dargestellt) hochpräzise messbar ist. Die Messteil-Achse 7 und die Kippachse 21 liegen in einer gemeinsamen Ebene, die von der Aufnahmeteil-Achse 4 und der

Stehachse 20 senkrecht durchstossen wird, wobei dieser Durchstosspunkt den Schnittpunkt zwischen der Messteil-Achse 7 und der Kippachse 21 des Prüflings 1 bildet. Abhängig von der Ausrichtung des Prüflings 1 gegenüber dem Aufnahmeteil 4

5 können die Messteil-Achse 7 und die Kippachse 21 aufeinander liegen, was in der in Fig. 3 gezeigten Darstellung der Fall ist. Somit ist es möglich, die Zieleinheit 18 und das Messteil 5 um eine gemeinsame Achse zu schwenken. Bei der Messteil-Lagereinheit 6 handelt es sich um ein hochpräzises Luftlager,

10 das ein leichtgängiges jedoch stabiles Schwenken des Messteils 5 um die Messteil-Achse 7 unter Einhaltung kleinsten Toleranzen ermöglicht. Da die Messteil-Lagereinheit 6 auf einer einzigen Seite einer von der Messteil-Achse 7 senkrecht durchstossenen Messebene 11, in der die Aufnahmeteil-Achse 4

15 liegt, am Sockel 2 angeordnet ist, ist es möglich, die Messteil-Lagereinheit 6 exakt zu justieren, ohne dass es aufgrund statischer Überbestimmtheit zu Verspannungen mit einer Lagereinheit auf der anderen Seite der Messebene 11 kommt. In Fig. 3 ist ein kleiner Ausschnitt der Messebene 11

20 symbolisch dargestellt. Durch dies im Wesentlichen zur Messteil-Achse 7 achssymmetrische Gestaltung des Messteils 5 liegt der Schwerpunkt des Messteils 5 nach der Messteil-Achse 7. Hierdurch werden Biege- und Torsionsbelastungen weitgehend vermieden und der Antrieb des Messteils 5 entlastet, so dass

25 Toleranzen gering gehalten und sehr hohe Messgenauigkeiten erzielbar sind. Auf dem Messteil 5 befindet sich eine Optikeinheit 8 mit einem optischen Detektor (in Fig. 3 nicht dargestellt, siehe unten), wobei die Optikeinheit 8 so auf dem Messteil 5 angeordnet ist, dass ein aus Richtung des Prüflings

30 1 kommendes Prüflings-Strahlenbündels (in Fig. 3 nicht dargestellt, siehe unten) von dem Detektor empfangbar ist, welches Prüflings-Strahlenbündel im Wesentlichen in der von der Messteil-Achse 7 senkrecht durchstossenen Messebene 11, in der die Aufnahmeteil-Achse 4 liegt, verläuft. In Fig. 3 wird

das Prüflings-Strahlenbündel von einer in der Zieleinheit 18 angeordneten, beleuchteten Strichplatte (in Fig. 3 nicht dargestellt) hervorgerufen. In diesem Fall handelt es sich bei der Strichplatte um die Referenzstruktur, deren

- 5 Winkelausrichtung zu prüfen ist. Die beleuchtete Strichplatte wird hierbei über ein Objektiv 16 der Zieleinheit 18 auf den Detektor der Optikeinheit 8 abgebildet und erzeugt somit eine Vielzahl von Punkten auf dem Detektor. Die Lage dieser Abbildung auf dem Detektor ändert sich bei geringfügiger
- 10 Verdrehung des Aufnahmeteils 3 um die Aufnahmeteil-Achse 4 und des Prüflings 1 um die Stehachse 20 bzw. des Messteils 5 um die Messteil-Achse 7 und der Zieleinheit 18 um die Kippachse 21. Somit ist es möglich, bei motorischem Verstellen der Vorrichtung und des Prüflings 1 um die jeweiligen Achsen,
- 15 anschliessendem Fein-Ausrichten, gesteuert durch die Lage der Abbildung auf dem Detektor, und Vergleichen der jeweiligen Winkelmesswerte die Winkelprüfung hochpräzise durchzuführen. Eine Steuerungs-Regelungs-Einheit 13 übernimmt hierbei die Auswertung des Detektors der Optikeinheit 8 und das motorische
- 20 Ausrichten der Optikeinheit 8 gegenüber der Referenzstruktur des Prüfling 1 mittels motorischem Einstellen des Aufnahmeteils 3 und des Messteils 5 in Abhängigkeit von der Lage der Abbildung auf dem Detektor. Außerdem übernimmt die Steuerungs-Regelungs-Einheit 13 die Ansteuerung der
- 25 elektromotorischen Ausrichtung der Zieleinheit 18 des Prüflings 1 und die Erfassung und Auswertung der Winkelmesswerte der Vorrichtung und des Prüflings 1, wobei die Kommunikation mit dem Prüfling 1 über ein im Aufnahmeteil 3 angeordnetes Schleifringsystem (nicht dargestellt) oder per
- 30 Funkverbindung über Bluetooth erfolgt. Wie in Fig. 3 erkennbar, ist es bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel nicht möglich, das Messteil 5 derart zu verstehen, dass die Optikeinheit 8 nahe dem Zenit positioniert wird. Auch ein Verstellen des Messteils 5 über den Zenit hinaus ist nicht

möglich, da derjenige der Optikeinheit 8 gegenüberliegende Teil des Messteils 5 mit der Horizontalmesseinheit 25 kollidieren würde, weshalb zum Kalibrieren des gegenüberliegenden Winkelbereichs ein Durchschlagen der 5 Zieleinheit 18 des Prüflings 1 oder eine Horizontalwinkelverstellung notwendig ist. Diese Einschränkung ist jedoch in der Praxis meist nicht von Nachteil. Da ein exakt stehachsfluchtendes Positionieren des Prüflings 1 auf der Horizontalmesseinheit 25 nicht möglich ist, würde eine 10 Messung nahe dem Zenit zu Fehlresultaten führen, wie oben in der Beschreibung der bekannten Theodolitenprüfmaschine beschrieben. Außerdem ist es einem Benutzer ohnehin in der Regel nicht möglich, zenitnahe Messungen durchzuführen, da das Okular der Zieleinheit 18 in diesem Bereich unzugänglich ist. 15 Weiter unten werden jedoch Ausführungsbeispiele dargestellt, bei denen auch eine zenitnahe Messung durchführbar ist.

Fig. 4 zeigt eine vereinfachte Ausschnittsdarstellung einer ersten alternativen Ausführungsform der Vorrichtung von Fig. 20 3. Wie in Fig. 3 weist die Vorrichtung zum Prüfen eines „Prüflings 1 einen mehrteiligen Sockel 2 mit einer Messteil-Lagereinheit 6 und einer Horizontalmesseinheit 25, die eine Aufnahmeteil-Lagereinheit 27 und ein um die Aufnahmeteil-Achse 4 drehbares Aufnahmeteil 3 umfasst, auf. Das auf einer 25 einzigen Seite der Messebene 11 durch die als Luftlager ausgebildete Messteil-Lagereinheit 6 gelagerte Messteil ist als eine Messwippe 5a ausgebildet, die rechtwinklig zueinander angeordnete Schenkeln 5a', 5a'' besitzt. Auf einem dieser Schenkel 5a', 5a'' ist die Optikeinheit 8 angeordnet. Die 30 Vorrichtung weist ausserdem einen Handhabungsroboter 22 auf, der einen Robotersockel 29 und einen elektromotorisch um die Messteil-Achse 7 schwenkbaren Greifer 28 umfasst. Zwischen dem Greifen 28 und der Zieleinheit 18 des Prüflings 1, insbesondere dem Objektiv 16, ist eine mechanische Verbindung

herstellbar, so dass die Zieleinheit 18 mittels des Handhabungsroboters 22 geschwenkt werden kann. Somit ist es möglich, einen Prüfling, der keine elektromotorische Verstellung seiner Zieleinheit besitzt, insbesondere einen 5 mechanisch verstellbaren Theodolit, mit der Vorrichtung zu prüfen, da die Ausrichtung des Prüflings 1 von dem Handhabungsroboter 22 übernommen wird. Durch eine variable Geometrie des Greifers 28 können Prüflinge unterschiedlicher Geometrien geprüft werden.

10

In Fig. 5 wird eine zweite alternative Ausführungsform der Vorrichtung von Fig. 3 vereinfacht in einem Ausschnitt dargestellt. Das Messteil ist als eine Messwippe 5b ausgebildet, wobei ein wesentlicher Teil dieser Messwippe 5b 15 achssymmetrisch bezüglich der Messteil-Achse 7 ist. Neben dem Sockel 2, der auf einer einzigen Seite der Messebene 11 angeordneten, als ein Luftlager ausgebildeten Messteil-Lagereinheit 6, der Horizontalmesseinheit 25, welche die Aufnahmeteil-Lagereinheit 27 und das um die Aufnahmeteil-Achse 20 4 drehbare Aufnahmeteil 3 umfasst, und dem Handhabungsroboter 22 mit dem Robotersockel 29 wird der Prüfling 1 mit der optischen Zieleinheit 18 einschliesslich einem Okular 23 gezeigt. Auf der Messwippe 5b ist ausser der Optikeinheit 8 auf derjenigen, der Optikeinheit 8 bezüglich der Messteil-Achse 25 gegenüberliegenden Seite eine Zusatzoptikeinheit 15 angeordnet. Diese Zusatzoptikeinheit 15 ist als ein Zusatz-Emitter ausgebildet, der eine Strahlung 30 erzeugt, die eine Strichplatte (nicht dargestellt) in der Zieleinheit 18 seitens des Okulars 23 beleuchtet. Durch die Strichplatte wird die 30 Strahlung 30 durch Abblendung bezüglich eines Strahlungsparameters verändert, wobei diese veränderte Strahlung das Prüflings-Strahlenbündel 10 bildet, das über das Objektiv 16 die Zieleinheit 18 verlässt, von der Optikeinheit 8 erfasst wird und mindestens einen Punkt auf dem Detektor (in

Fig. 5 nicht dargestellt) erzeugt. Alternativ ist es möglich, die Zusatzoptikeinheit 15 als einen Zusatz-Spiegel auszubilden. In diesem Fall wird die Strahlung beispielsweise von der Optikeinheit 8 ausgesendet, von dem Zusatz-Spiegel 5 reflektiert, von der Strichplatte bezüglich eines Strahlungsparameters verändert, wobei dieser Veränderung entweder vor, nach oder vor und nach der Reflexion am Zusatz-Spiegel erfolgt, und trifft anschliessend auf den Detektor. Weiters ist es möglich, dass die Zusatzoptikeinheit 15 eine, 10 eine Strukturierung – beispielsweise ein Muster – aufweisende Strahlung 30 aussendet. Durch insbesondere mittels Bildverarbeitung erfolgendem Vergleich der Strukturierung der ausgesendeten Strahlung 30 und des empfangenen Prüflings-Strahlenbündels 10 können Fehler in der Optik der Zieleinheit 15, insbesondere Linsenfehler, Verzerrungen, Verzeichnungen, Fokussierungsfehler in Tubusverlauf, etc., erfasst werden.

In Fig. 6 ist eine vereinfachte Ausschnittsdarstellung einer dritten alternativen Ausführungsform der Vorrichtung mit einem 20 als Messrad 5c ausgebildeten Messteil dargestellt. Das Messrad 5c wird von der auf einer einzigen Seite der Messebene 11 angeordneten und als Luftlager ausgebildeten Messteil-Lagereinheit 6 um die Messteil-Achse 7 drehbar gelagert. Wie in den obigen Aufbauten weist die Vorrichtung eine 25 Horizontalmesseinheit 25 mit einer Aufnahmeteil-Lagereinheit 27 zum – um die Aufnahmeteil-Achse 4 drehbaren – Lagern des Aufnahmeteils 3 auf. Weiters sind der auf dem Aufnahmeteil 3 positionierte Prüfling 1 mit seiner Zieleinheit 18 und dem Objektiv 16, und der Handhabungsroboter 22 mit dem 30 Robotersockel 29 zu sehen. Aufgrund der Geometrie des Messrades 5c weist die Vorrichtung hingegen einen Sockel 2a auf, der so ausgebildet ist, dass das Messrad 5c den Prüfling 1 und die Horizontalmesseinheit 25 umschliesst. Auf dem Messrad 5c sind sowohl die Optikeinheit 8, als auch auf der

gegenüberliegenden Seite die Zusatzoptikeinheit 15 angeordnet. Die rotationssymmetrische Form des Messrades 5c hat den Vorteil, dass elastische Verformungen, die sich in Abhängigkeit von der Lage der Optikeinheit 8 und der

- 5 Zusatzoptikeinheit 15 ergeben, weitgehend vermeiden lassen. In dieser Ausführungsform sind zenitnahe Messungen – insbesondere bei Verzicht auf die Zusatzoptikeinheit 15 – durchführbar, da das Messrad – bei entsprechender Positionierung der Optikeinheit 8 – im Wesentlichen frei rotierbar ist.

10

- Während sich in den vorangegangenen beispielhaften Ausführungsformen die Messteil-Lagereinheit auf einer einzigen Seite der Messebene 11 befindet, zeigt Fig. 7 eine Ausführungsform, in der die Messteil-Lagereinheit innerhalb 15 der Messebene 11 angeordnet ist. Die auf einem Sockel 2b fixierte Horizontalmesseinheit 25 mit einer Aufnahmeteil-Lagereinheit 27 zum drehbaren Lagern des Aufnahmeteils 3 um die Aufnahmeteil-Achse 4 entspricht den vorangegangenen Beschreibungen. Der auf dem Aufnahmeteil 3 positionierte 20 Prüfling 1 mit seiner Zieleinheit 18, dem Okular 23 und dem Objektiv 16 besitzt eine beleuchtete Strichplatte (in Fig. 7 nicht dargestellt), deren ausgesandte Strahlung nach Formung durch das Objektiv 16 das Prüflings-Strahlenbündel 10 bildet. Der Prüfling 1 und die Horizontalmesseinheit 25 wird von einem 25 ringförmigen, als Messring 5d ausgebildeten Messteil umschlossen. Der in seiner Grundform rotationssymmetrische Messring 5d ist um die Messteil-Achse 7 drehbar gelagert, wobei die Lagerung über eine als Luflager ausgebildete Messteil-Lagereinheit 6a erfolgt, die auf und teilweise in dem 30 mehrteiligen Sockel 2b angeordnet ist. Die Aussenfläche und gegebenenfalls auch die Innenfläche des Messrings 5d stellen hierbei Lagerflächen des Luflagers dar. Eine auf dem Messring 5d montierte Optikeinheit 8 mit einem optischen Detektor (in Fig. 7 nicht dargestellt) dient, wie bereits oben beschrieben,

zum Empfangen des Prüflings-Strahlenbündels 10, durch welches die Strichplatte auf den Detektor der Optikeinheit 8 abgebildet wird und dort somit eine Vielzahl von Punkten erzeugt. Es ist möglich, vergleichbar mit Fig. 5 und Fig. 6, 5 den Messring 5d ebenfalls mit einer Zusatzoptikeinheit 15, insbesondere einem Zusatz-Emitter oder einem Zusatz-Spiegel, auszustatten. Da die Messteil-Lagereinheit 6a mittig angeordnet ist und sich in der Messebene 11, unterhalb des Prüflings 1 und unterhalb der Horizontalmesseinheit 25 10 befindet, ist der Prüfling 1 von beiden Seiten leicht zugänglich, was vor allem bei der Montage des Prüflings 1 und Kalibrierarbeiten am Prüfling 1 vorteilhaft ist. Durch die rotationssymmetrische Grundform des Messrings 5d und die nahe oder im Lot des Schwerpunkts des Messrings 5d befindliche 15 Messteil-Lagereinheit 6a werden Biege- und Torsionsmomente am Messteil weitgehend vermieden, so dass höchste Messgenauigkeiten erreichbar sind.

Fig. 8 zeigt den Strahlengang einer möglichen Ausführungsform, 20 bei welcher die Optikeinheit den Aufbau eines bekannten Autokollimators aufweist und die Referenzstruktur des Prüflings von einer ebenen Reflexionsfläche gebildet wird. Die als Autokollimator ausgebildete Optikeinheit 8a umfasst einen Emitter 31a, eine Optikeinheit-Marke 32 in Form einer 25 Strichplatte, einen Teilerwürfel 33 zur physikalischen Strahlteilung, ein Optikeinheit-Objektiv 34a und einen optischen Detektor 9. Die Optikeinheit 8a sendet eine Strahlung in Form eines kollimierten Sende-Strahlungsbündels 35a aus, das von einer ebenen, die Referenzstruktur bildenden 30 Reflexionsfläche 36 am Prüfling 1 reflektiert wird. Dieses reflektierte und somit bezüglich eines Strahlungsparameters veränderte Strahlungsbündel bildet das Prüflings-Strahlenbündel 10a, das somit ebenfalls kollimiert ist. Das Prüflings-Strahlenbündel 10a wird, sofern das kollimierte

Sende-Strahlungsbündels 35a im Wesentlichen senkrecht auf die ebenen Reflexionsfläche 36 auftrifft, vom Optikeinheit-Objektiv 34a erfasst und auf den Detektor 9 fokussiert, auf welchem somit die Optikeinheit-Marke 32 abgebildet wird und

5 mindestens einen Punkt 12 bzw. eine Schar solcher Punkte 12 auf dem Detektor 9 erzeugt. Die Lage dieser Abbildung und dieser Schar von Punkten 12 ist abhängig von der Winkel ausrichtung der Optikeinheit 8a gegenüber der ebenen Reflexionsfläche 36 bzw. der Referenzstruktur des Prüflings 1.

10 Diese ebene Reflexionsfläche 36 wird direkt von einer ebenen Reflexionsfläche als Referenzstruktur am Prüfling 1 gebildet. Es ist hiermit möglich, auch einen polygonalen Spiegel, beispielsweise einen für das Rosettenverfahren einzusetzenden Referenzspiegel, bezüglich der Ausrichtung seiner

15 Spiegelflächen zu untersuchen.

Die bezüglich der Winkel ausrichtung zu untersuchende Referenzstruktur zahlreicher Prüflinge wird jedoch oft nicht - wie oben - von einer ebenen Fläche gebildet, sondern von einer

20 gewölbten Struktur, beispielsweise einer innerhalb des Objektivs 16 der Zieleinheit 18 befindlichen Linse. In Fig. 9 wird die Optikeinheit 8a - wie auch in Fig. 8 - dargestellt. Vor dem Optikeinheit-Objektiv 34a ist jedoch eine zusätzliche in ihrer Position veränderbare Vorsatzlinse 37a in Form einer

25 Zerstreuungslinse angeordnet, so dass das Sende-Strahlungsbündel 35b divergiert. Das divergierende Sende-Strahlungsbündel 35b trifft auf eine erste und eine zweite Sammellinse 38a' und 38a'' des Objektivs 16 der optischen Zieleinheit 18 des Prüflings 1, wird von diesen Sammellinsen

30 38a' und 38a'' fokussiert, trifft auf die konvexe Linse 39, welche hier die Referenzstruktur des Prüflings 1 bildet, und wird von dieser konvexen Linse 39 reflektiert, wodurch eine Veränderung eines Strahlungsparameters stattfindet. Das reflektierte Strahlungsbündel bildet das Prüflings-

Strahlenbündel 10b, welches wie oben beschrieben auf den Detektor 9 der Optikeinheit 8a fokussiert wird. Damit die hauptsächliche Reflexion des Sende-Strahlungsbündels 35b an der konvexen Linse 39 – und nicht an einer vorgeschalteten 5 Linse – erfolgt, ist der Einsatz von optischen Filtern (in Fig. 9 nicht dargestellt), die dem Emitter 31a nachgeschaltet sind, möglich. Die Prüfung der Winkelausrichtung durch die Optikeinheit 8a erfolgt in der oben beschriebenen Weise. Es ist möglich, die Vorrichtung durch einen flexiblen Einsatz der 10 Vorsatzlinse 37a von einer ebenen auf eine konvexe oder gegebenenfalls eine konkave Referenzstruktur umzurüsten, ohne dabei einen wesentlichen Eingriff in die Vorrichtung vorzunehmen. Die Ausgestaltung der Vorsatzlinse hängt insbesondere von der Form der als Referenzstruktur dienenden 15 Linse und dem vorangeschalteten Linsensystem ab.

In einer weiteren Ausführungsform, wie in Fig. 10 gezeigt, wird die Referenzstruktur von einer Strichplatte in der Zieleinheit des Prüflings gebildet. Die Optikeinheit 8b weist 20 einen Emitter 31b, einen Teilerwürfel 33 zur physikalischen Strahlteilung, ein Optikeinheit-Objektiv 34b und einen optischen Detektor 9 auf. Die Optikeinheit 8b sendet eine Strahlung in Form eines Sende-Strahlungsbündels 35c aus, das von dem Objektiv 16 der Zieleinheit 18 des Prüflings 1 erfasst 25 wird, auf die Strichplatte 14 der Zieleinheit 18 trifft und diese Strichplatte 14 beleuchtet. Die Strichplatte 14 befindet sich im Brennpunkt des Objektivs 16 der Zieleinheit 18. Die durch diese Beleuchtung der Strichplatte 14 hervorgerufene Reflexion bildet ein Strahlungsbündel, das nach Kollimierung 30 durch nähliches Objektiv 16 das Prüflings-Strahlenbündel 10c darstellt. Dieses Prüflings-Strahlenbündel 10c wird vom Optikeinheit-Objektiv 34b auf den Detektor 9 fokussiert, auf welchem somit die Strichplatte 14 der Zieleinheit 18 des Prüflings 1 abgebildet wird und dort eine Schar von Punkten 12

erzeugt. Die Lage dieser Abbildung bzw. der Schar dieser Punkte 12 auf dem Detektor 9 ist abhängig von der Winkelausrichtung der Zieleinheit 18 bzw. der Strichplatte 14 als Referenzstruktur des Prüflings 1 gegenüber der Optikeinheit 8b der Vorrichtung. Alternativ ist es beispielsweise möglich, die Strichplatte 14 nicht über das Objektiv 16 mittels eines Emitters 31b innerhalb der Optikeinheit 8b zu beleuchten, sondern die Beleuchtung auf der anderen Seite der Strichplatte seitens des Okulars 23 (siehe Fig. 5 und Fig. 7) der Zieleinheit 18, beispielsweise über eine Zusatzoptikeinheit 15 (siehe Fig. 5 und 6) in Form eines Zusatz-Emitters, durchzuführen. Bei einer selbstleuchtenden Strichplatte oder einer durch eine Beleuchtung innerhalb der Zieleinheit 18 beleuchteten Strichplatte kann gänzlich auf einen externen Emitter verzichtet werden. Ferner sind weitere Beleuchtungsmöglichkeiten der Strichplatte 14 möglich, wobei unter Beleuchtung ebenfalls die Bestrahlung mit einer nicht sichtbaren Strahlung zu verstehen ist. Anstelle der Strichplatte 14 kann auch die Oberfläche eines Teilerwürfels der Zieleinheit, einer Bildaufnahmefläche oder einer Distanzmessungs-Laserdiode als Reflexionsfläche dienen.

Soll eine Struktur oder ein Objekt, beispielsweise eine Strichplatte oder eine Blende, innerhalb der Zieleinheit 18 untersucht werden, kann dies in der in Fig. 11 beschriebenen Weise geschehen. Die Optikeinheit 8c weist einen Emitter 31c, einen Teilerwürfel 33 zur physikalischen Strahlteilung, ein Optikeinheit-Objektiv 34c und einen optischen Detektor 9 auf. Eine Strahlung in Form eines Sende-Strahlungsbündels 35d wird von der Vorsatzlinse 37b gestreut und beleuchtet eine Struktur 40 innerhalb der optischen Zieleinheit 18 des Prüflings 1. Diese beleuchtete Struktur 40 wird über die Sammellinsen 38b' und 38b'', die Vorsatzlinse 37b und das Optikeinheit-Objektiv 34c auf den Detektor 9 mittels dem Strahlenbündel 10d

abgebildet und kann somit graphisch dargestellt und geprüft werden. Diese Struktur wird beispielsweise von einer Bildaufnahmefläche, beispielsweise einem CCD-Chip, oder einer Laserdiode eines Entfernungsmessers gebildet. Andere 5 Beleuchtungsvarianten, wie oben bereits beschrieben, sind auch hier realisierbar.

Es ist möglich, die in Fig. 8 bis 11 beschriebenen Prüfverfahren mit einer einzigen Optikeinheit, gegebenenfalls 10 unter Verwendung von unterschiedlichen Objektiven oder Vorsatzlinsen, durchzuführen und hierdurch eine einzige Vorrichtung ohne aufwendiges Umrüsten für unterschiedliche Prüflinge oder Prüfverfahren zu verwenden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Prüfen oder Kalibrieren der winkelabhängigen Ausrichtung einer Referenzstruktur eines hochpräzisen

5 Prüflings (1),

unter Verwendung einer Vorrichtung mit

- einem verstellbaren oder fixierten Aufnahmeteil (3) zur Aufnahme des Prüflings (1),

- einem verstellbaren Messteil (5, 5a, 5b, 5c, 5d), wobei das Messteil (5, 5a, 5b, 5c, 5d) und das Aufnahmeteil (3) relativ zueinander um eine Aufnahmeteil-Achse (4) und eine die Aufnahmeteil-Achse (4) rechtwinklig schneidende Messteil-Achse (7) drehbar sind, und ein Aufnahmeteil-Verdrehwinkel um die Aufnahmeteil-Achse (4) und ein Messteil-Verdrehwinkel um die Messteil-Achse (7) zwischen dem Messteil (5, 5a, 5b, 5c, 5d) und dem Aufnahmeteil (3) messbar sind,

- einer auf dem Messteil (5, 5a, 5b, 5c, 5d) angeordneten Optikeinheit (8, 8a, 8b, 8c) mit einem optischen

20 Detektor (9) zum Empfangen mindestens eines mit dem Prüfling (1) in Wechselwirkung stehenden Prüflings-Strahlenbündels (10, 10a, 10b, 10c, 10d), das im Wesentlichen in einer von der Messteil-Achse (7) senkrecht durchstossenen Messebene (11), in der die

25 Aufnahmeteil-Achse (4) liegt, verläuft und auf dem Detektor (9) mindestens einen Punkt (12) erzeugt, und

- einer Steuerungs-Regelungs-Einheit (13) zumindest zum motorischen Ausrichten der Optikeinheit (8, 8a, 8b, 8c) gegenüber der Referenzstruktur des Prüflings (1) mittels motorischem Einstellen des Aufnahmeteil-Verdrehwinkels und des Messteil-Verdrehwinkels in Abhängigkeit von der Lage des mindestens einen Punktes (12) auf dem Detektor (9),

mit den Verfahrensschritten

- Anordnen des Prüflings (1) auf dem Aufnahmeteil (3),
- Vor-Ausrichten der Optikeinheit (8, 8a, 8b, 8c) und/oder der Referenzstruktur des Prüflings (1), so dass das Prüflings-Strahlenbündel (10, 10a, 10b, 10c, 10d) zumindest teilweise auf den Detektor (9) trifft und dort mindestens den einen Punkt (12) erzeugt,
- Auswerten der Lage des mindestens einen Punktes (12) auf dem Detektor (9) durch die Steuerungs-Regelungs-Einheit (13),
- relatives Fein-Ausrichten der Optikeinheit (8, 8a, 8b, 8c) gegenüber der Referenzstruktur über die Steuerungs-Regelungs-Einheit (13) in Abhängigkeit von der Lage des mindestens einen Punktes (12) auf dem Detektor (9), so dass der mindestens eine Punkt (12) eine bestimmte Solllage auf dem Detektor (9) erreicht, und
- Erfassen zumindest des Aufnahmeteil-Verdrehwinkels und/oder des Messteil-Verdrehwinkels, wobei eine Strahlung (30, 35a, 35b, 35c, 35d) von der Referenzstruktur des Prüflings (1) erzeugt oder bezüglich eines Strahlungsparameters - insbesondere durch Reflexion, Abblendung, Filterung oder Formung - verändert wird und die erzeugte oder veränderte Strahlung (30, 35a, 35b, 35c, 35d) das Prüflings-Strahlenbündel (10, 10a, 10b, 10c, 10d) bildet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Prüfling (1)
 - insbesondere ein Theodolit, ein Nivellier oder ein geodätischer Scanner - eine optische Zieleinheit (18) aufweist, die
 - um eine Stehachse (20) und gegebenenfalls eine Kippachse (21) verstellbar ist,
 - eine Zielachse bestimmt und

- eine optisch detektierbare Marke - beispielsweise eine Strichplatte (14) oder einen Leuchtaustritt - aufweist, wobei ein Stehachs-Verdrehwinkel und gegebenenfalls ein Kippachs-Verdrehwinkel erfassbar sind, und

5 wobei

- ein Prüflings-Unterteils (19) auf dem Aufnahmeteil (3) so angeordnet wird, dass die Aufnahmeteil-Achse (4) gegenüber der Stehachse (20) und gegebenenfalls die Messteil-Achse (7) gegenüber der Kippachse (21) im Wesentlichen kollinear verlaufen,
- vor oder während des Vor-Ausrichtens der Optikeinheit (8, 8a, 8b, 8c) ein Vor-Ausrichten der optischen Zieleinheit (18) erfolgt, und
- der Stehachs-Verdrehwinkel und/oder gegebenenfalls der Kippachs-Verdrehwinkel erfasst werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Prüfling (1) einen Laserdistanzmesser mit einem die Referenzstruktur bildenden Lasermessstrahlemitter zum Erzeugen einer Lasermessstrahls, der das Prüflings-Strahlenbündel bildet, aufweist, mit dem zusätzlichen Verfahrensschritt des Aussendens der Lasermessstrahls durch den Laserdistanzmesser.

25 4. Verfahren nach Anspruch 2, wobei

- die Strahlung (35a, 35b, 35c, 35d) von einem in der Optikeinheit (8a, 8b, 8c) angeordneten Emitter (31a, 31b, 31c) ausgesendet und geformt wird,
- anschliessend die Strahlung (35a, 35b, 35c, 35d) von der Referenzstruktur des Prüflings (1) reflektiert wird und somit das Prüflings-Strahlenbündel (10a, 10b, 10c, 10d) bildet, und

- das Prüflings-Strahlenbündel (10a, 10b, 10c, 10d) beim Auftreffen auf ein Teil der Optikeinheit (8a, 8b, 8c) auf den Detektor (9) abgebildet wird und bei exakter Ausrichtung der Optikeinheit (8a, 8b, 8c) gegenüber der Referenzstruktur mindestens einen Punkt (12) auf dem Detektor (9) erzeugt.

5 5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Referenzstruktur von einer Linse (39) der Zieleinheit (18) gebildet wird.

10 6. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Referenzstruktur von einer einem Teilerwürfel der Zieleinheit (18) gebildet wird.

15 7. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Referenzstruktur von einer Bildaufnahmefläche - insbesondere einem CCD-Chip - der Zieleinheit (18) gebildet wird.

20 8. Verfahren nach Anspruch 2, wobei

- die Referenzstruktur durch die optisch detektierbare Marke, die zumindest während des Feinausrichtens aktiv oder passiv beleuchtet ist, gebildet wird, und
- die Strahlung (30, 35c) von der Marke erzeugt oder bezüglich des Strahlungsparameters verändert wird.

25 9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Marke als eine Strichplatte (14) ausgebildet ist, welche Strichplatte (14) selbstleuchtend ist oder zumindest während des Feinausrichtens durch einen in der optischen Zieleinheit (18) angeordneten Emitter beleuchtet wird, das so gebildete Prüflings-Strahlenbündel (10, 10c) über ein Objektiv (16) der Zieleinheit (18) direkt oder indirekt zumindest teilweise auf den Detektor (9) abgebildet wird

und somit den mindestens einen Punkt (12) auf dem Detektor (9) erzeugt.

10. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Marke als eine
5 Strichplatte (14) ausgebildet ist und über einen seitens eines Objektivs (16) der Zieleinheit (18) angeordneten Emitter (31b) zumindest während des Feinausrichtens beleuchtet wird, wobei die Strichplatte (14) über das Objektiv (16) der Zieleinheit (18) direkt oder indirekt zumindest teilweise auf den Detektor (9) abgebildet wird
10 und somit den mindestens einen Punkt (12) auf dem Detektor (9) erzeugt.

11. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Marke als eine
15 Strichplatte (14) ausgebildet ist und über einen seitens eines Okulars (23) der Zieleinheit (18) angeordneten Zusatz-Emitter - insbesondere über eine Zusatzoptikeinheit (15) - zumindest während des Feinausrichtens beleuchtet wird, wobei die Strichplatte (14) über ein Objektiv (16)
20 der Zieleinheit (18) direkt oder indirekt zumindest teilweise auf den Detektor (9) abgebildet wird und somit den mindestens einen Punkt (12) auf dem Detektor (9) erzeugt.

25 12. Verfahren nach Anspruch 2, wobei

- die Strahlung von einer seitens eines Okulars (23) oder eines Objektivs (16) der Zieleinheit (18) angeordneten Zusatzoptikeinheit (15) mit einer räumlichen Strukturierung - insbesondere in Form eines Musters - in
30 Richtung des Okulars (23) ausgesendet wird,
- die Strahlung die Zieleinheit (18) durchdringt, von mindestens einer Referenzstruktur in der Zieleinheit (18) bezüglich eines Strahlungsparameters verändert wird

und somit das Prüflings-Strahlenbündel (10a, 10b, 10c, 10d) bildet, und

- das Prüflings-Strahlenbündel (10a, 10b, 10c, 10d) nach Austritt aus dem Objektiv (16) oder Okular (23) der Zieleinheit (18) beim Auftreffen auf ein Teil der Optikeinheit (8a, 8b, 8c) auf den Detektor (9) abgebildet wird und eine Vielzahl von Punkten (12) auf dem Detektor (9) erzeugt, und
- durch Auswerten der von dem Detektor (9) detektierten Vielzahl an Punkten durch die Steuerungs-Regelungs-Einheit (13) optische Fehler, insbesondere Verzerrungen und Verzeichnungen, detektierbar sind.

10
15 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 12, wobei eine Struktur (40) mindestens eines Teils der Zieleinheit (18) auf den Detektor (9) abgebildet wird.

20 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei durch einen thermischen Strahler der Prüfling (1) zumindest von einer Seite zum Ermitteln des thermischen Verhaltens erwärmt wird.

1/8

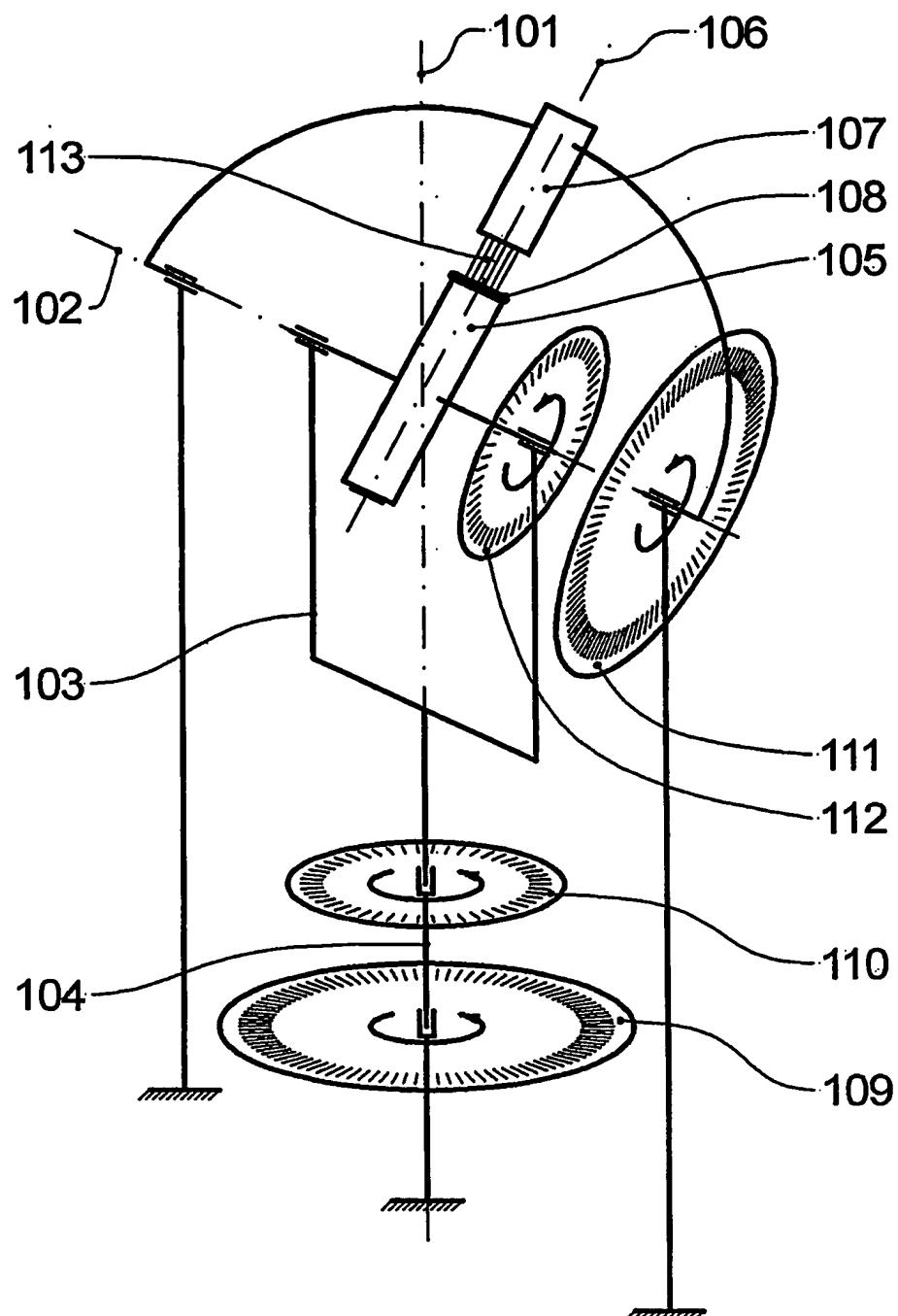


FIG. 1

2 / 8

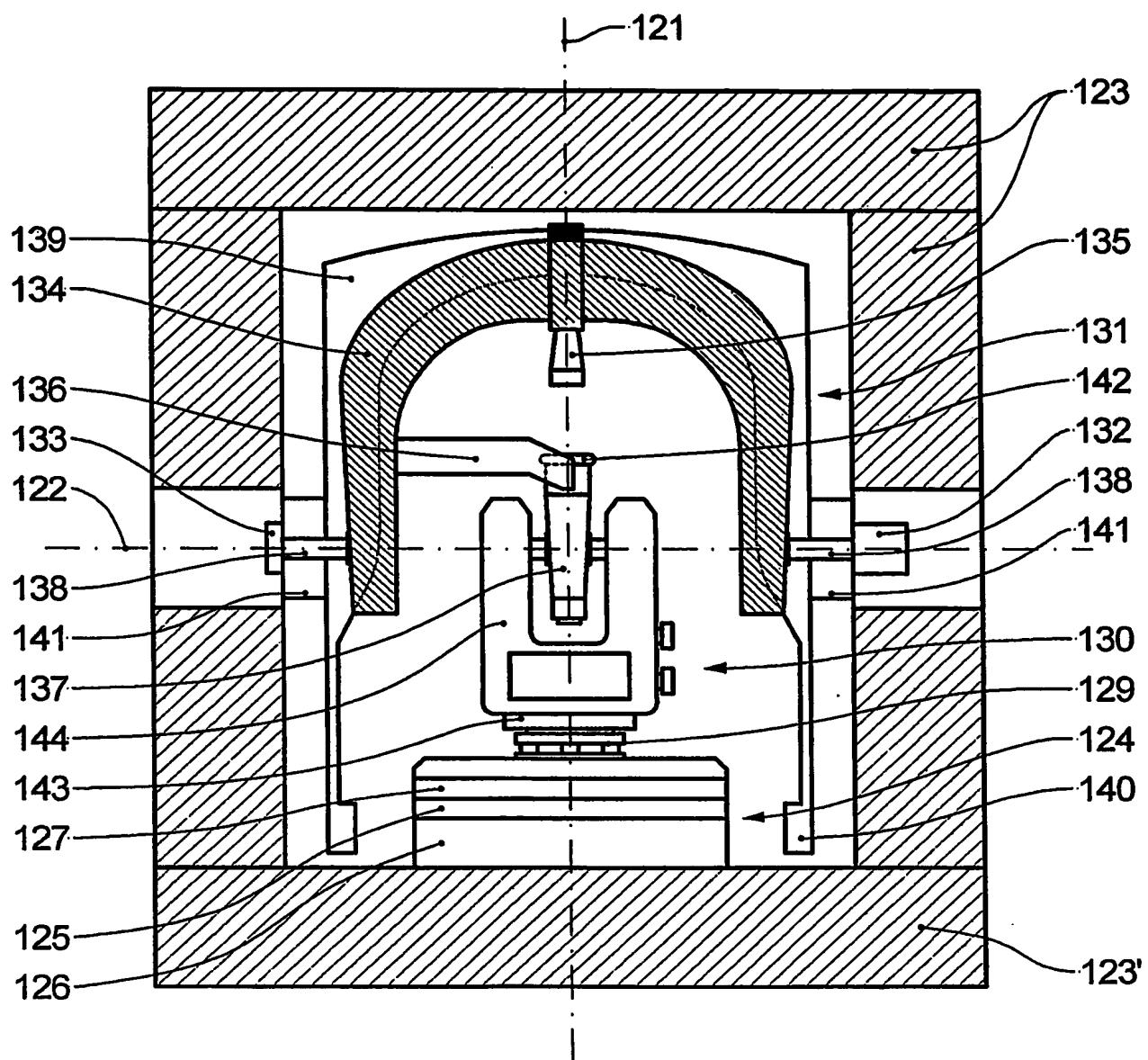


FIG. 2

3/8

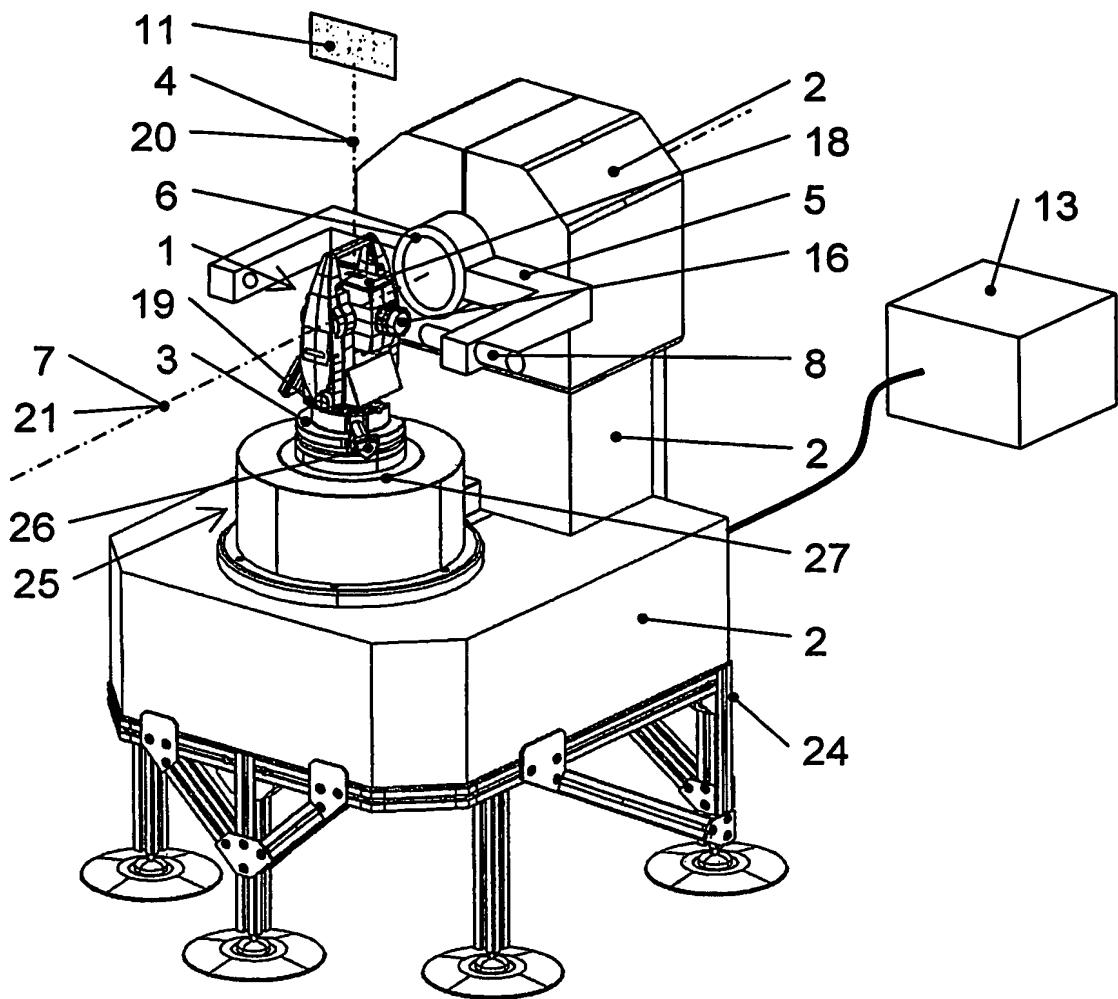


FIG. 3

4 / 8

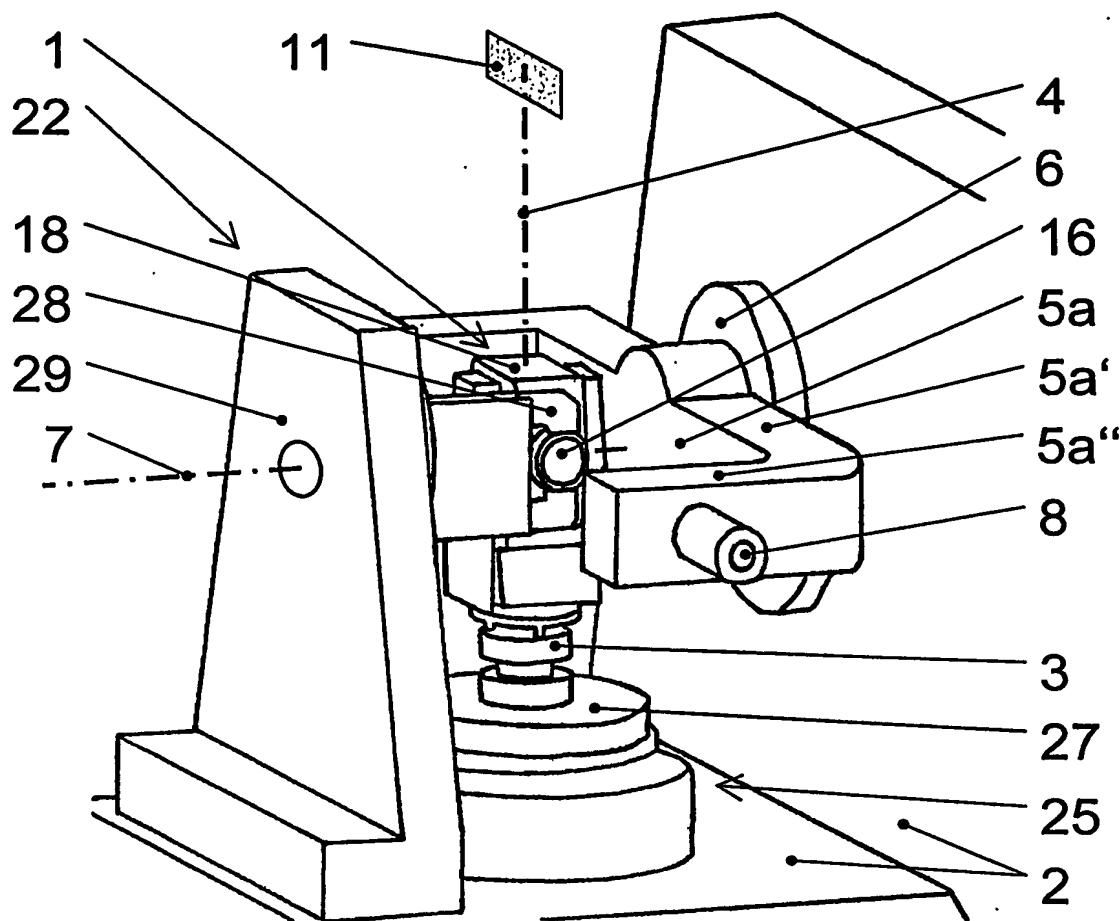
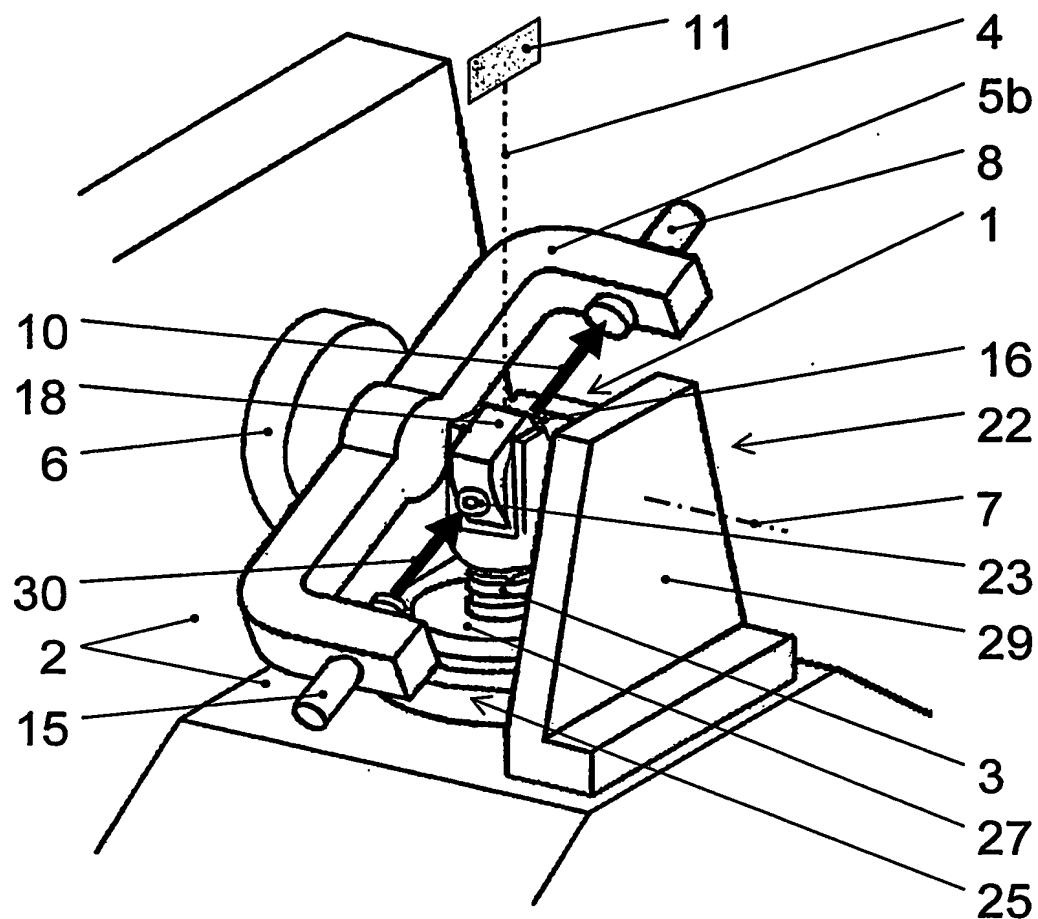


FIG. 4

5/8

**FIG. 5**

6/8

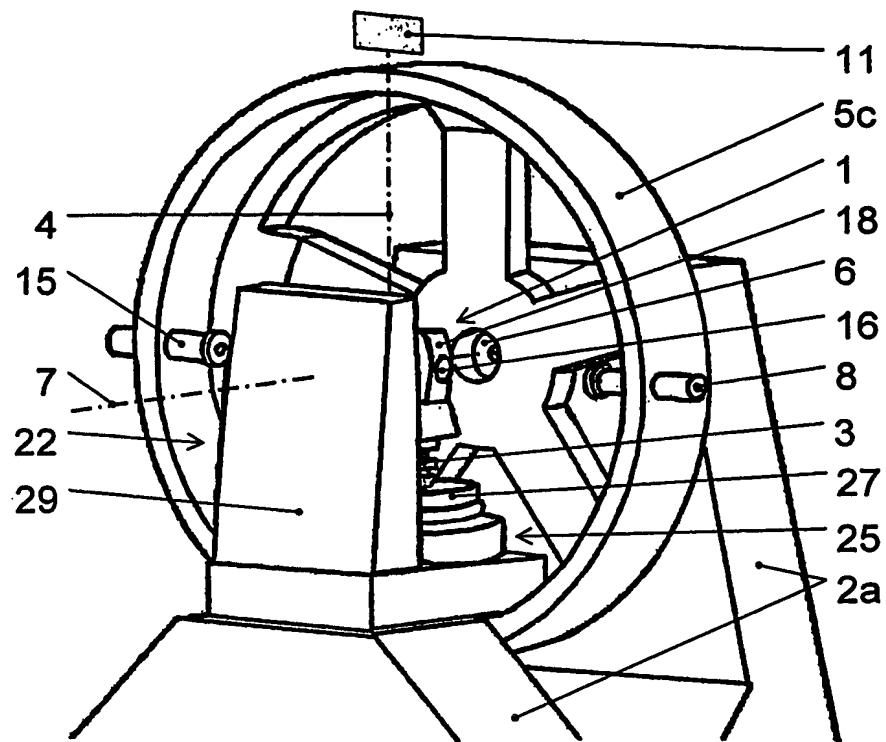


FIG. 6

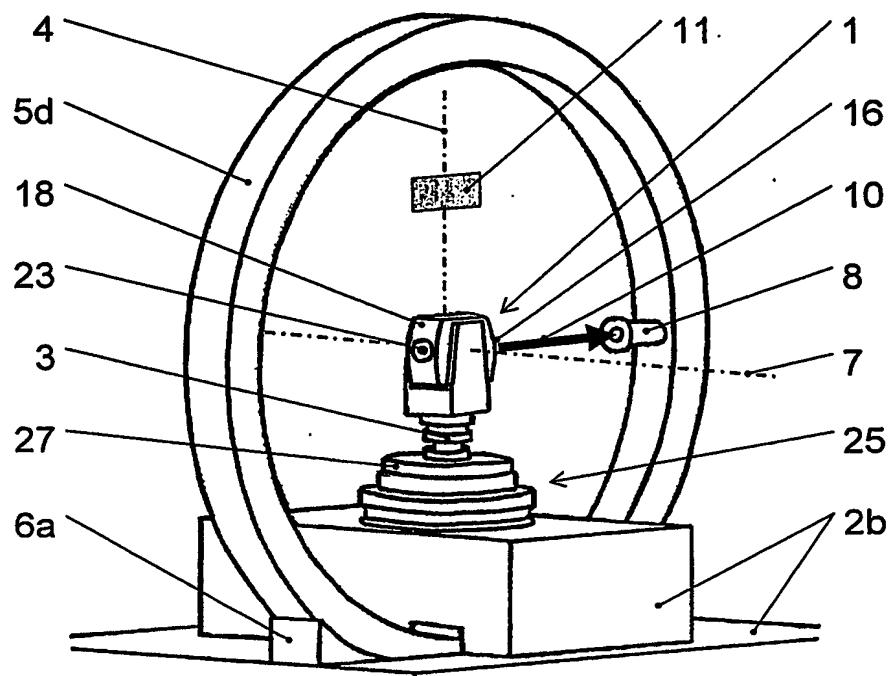


FIG. 7

7 / 8

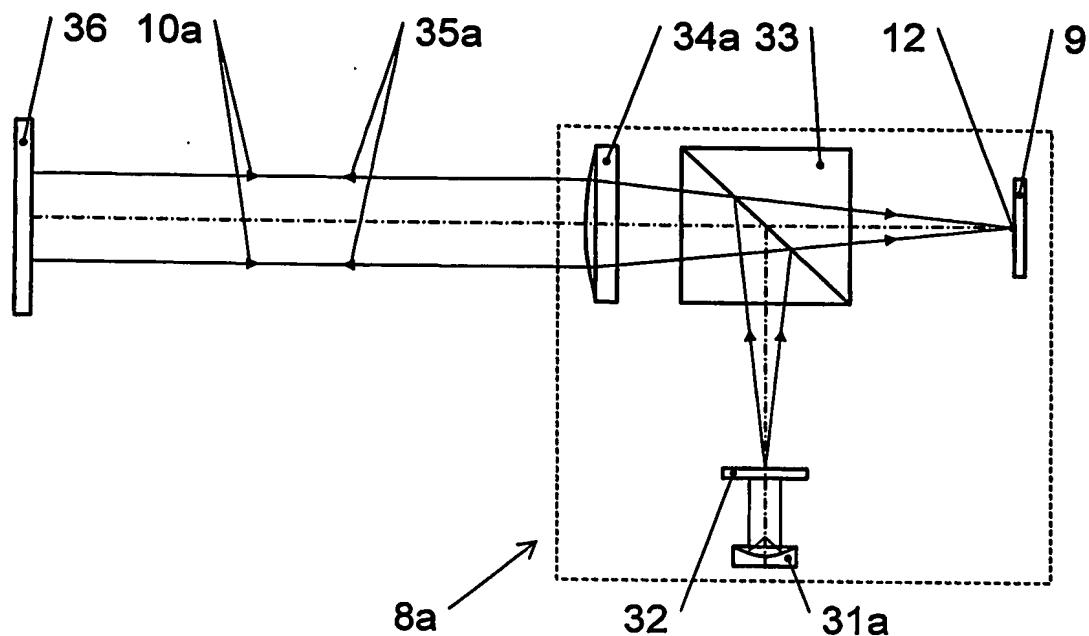


FIG. 8

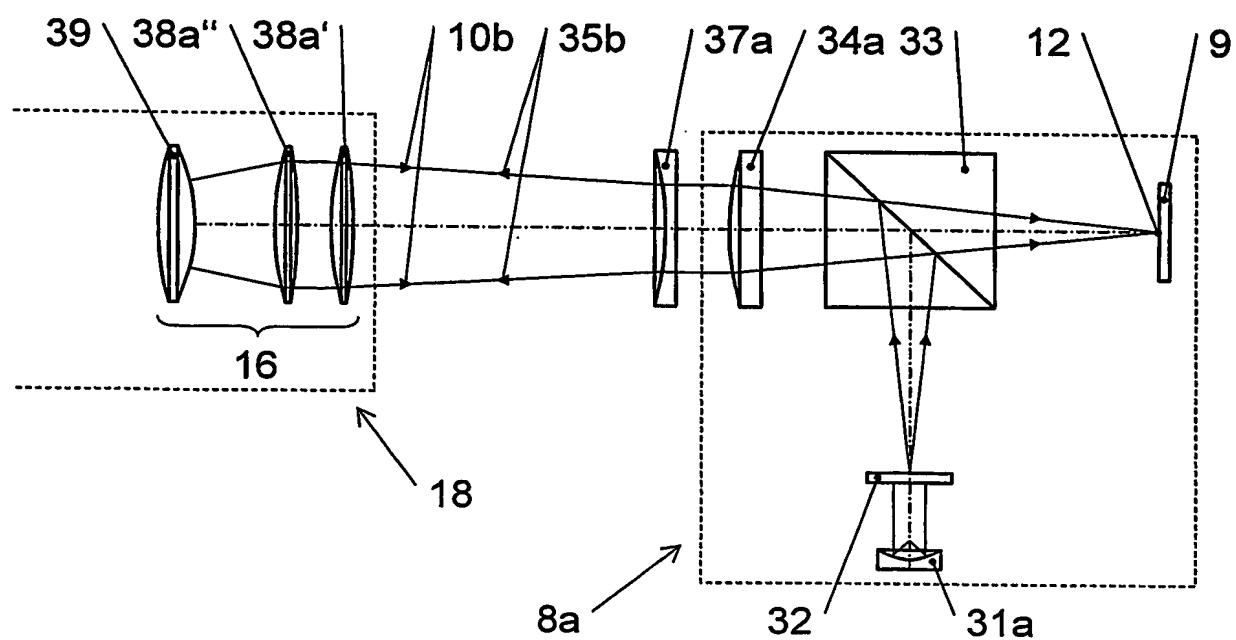
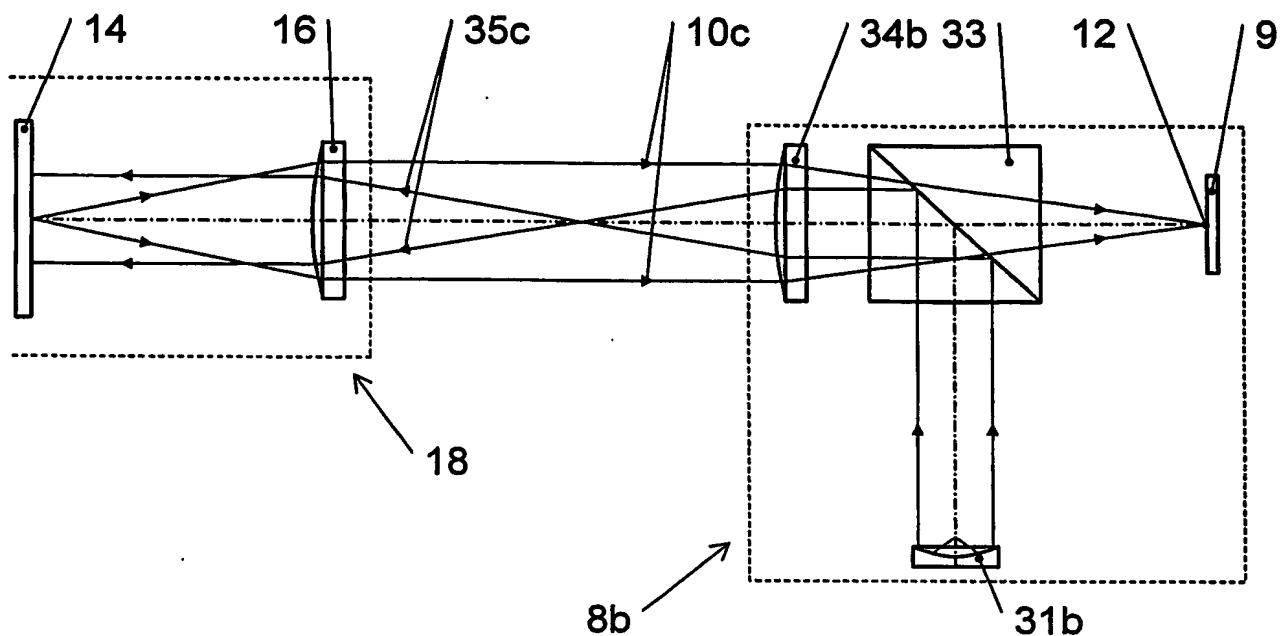
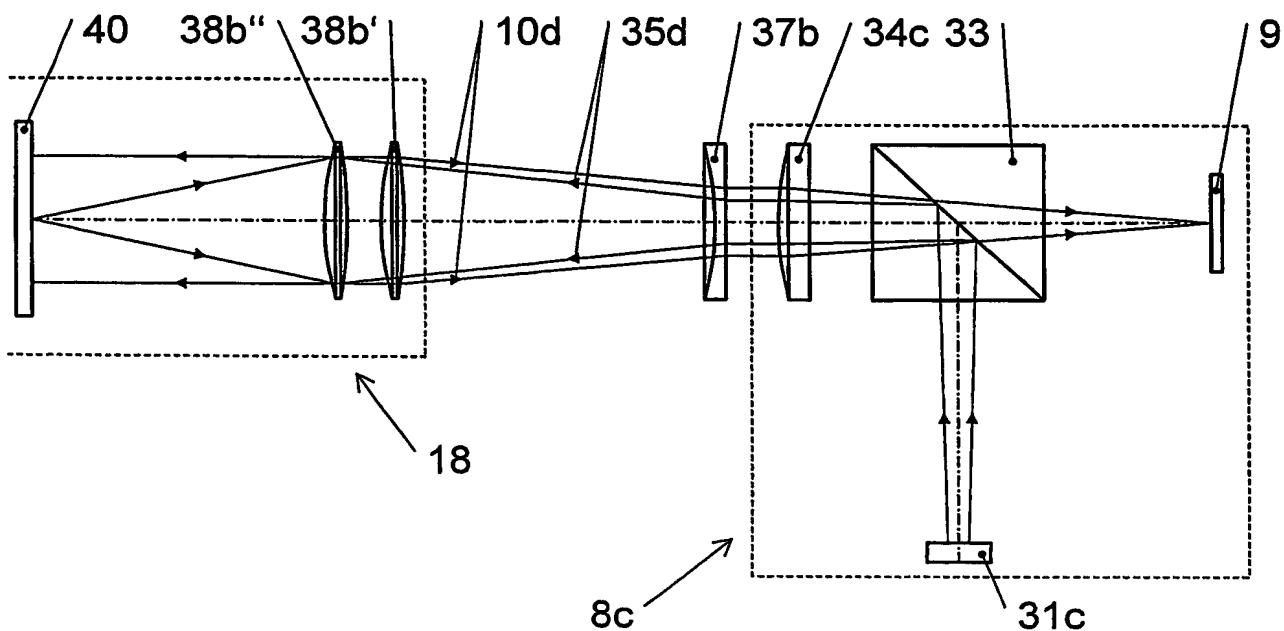


FIG. 9

8 / 8

**FIG. 10****FIG. 11**

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/008263

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G01C1/02 G01C25/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>H. INGENSAND: "TPM- EIN NEUES GERÄT ZUR VOLLAUTOMATISCHEN PRÜFUNG VON TEILKREISEN IN ELEKTRONISCHEN THEODOLITEN", X. Internationaler Kurs für Ingenieurvermessung, München, 12-17 September 1988 cited in the application XP008038351 the whole document</p> <hr/> <p style="text-align: center;">-/-</p>	1-14

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the International filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 November 2004

Date of mailing of the international search report

02/12/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hoekstra, F

Right Authority Best Available Copy

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/008263

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>DATABASE WPI Section EI, Week 8122 8 July 1981 (1981-07-08), Derwent Publications Ltd., London, GB; Class S02, AN 1981-F0467D XP002266305 -& SU 763 682 A (GEOD AERIAL SURVY) 16 September 1980 (1980-09-16) cited in the application abstract -----</p>	1

Best Available Copy

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP2004/008263

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
SU 763682	A 15-09-1980 SU	763682 A1	15-09-1980

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/008263

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 GO1C1/02 GO1C25/00

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 GO1C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalem Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>H. INGENSAND: "TPM- EIN NEUES GERÄT ZUR VOLLAUTOMATISCHEN PRÜFUNG VON TEILKREISEN IN ELEKTRONISCHEN THEODOLITEN", X. Internationaler Kurs für Ingenieurvermessung, München, 12-17 September 1988 in der Anmeldung erwähnt XP008038351 das ganze Dokument</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">-/-</p>	1-14

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- *'A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *'E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *'L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifeifhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *'O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *'P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *'T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *'X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *'Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *'*&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts
23. November 2004	02/12/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Hoekstra, F

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHTInternationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/008263**C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beir. Anspruch Nr.
A	<p>DATABASE WPI Section EI, Week 8122 8. Juli 1981 (1981-07-08), Derwent Publications Ltd., London, GB; Class S02, AN 1981-F0467D XP002266305 -& SU 763 682 A (GEOD AERIAL SURVY) 16. September 1980 (1980-09-16) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung</p> <p>—</p>	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/008263

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
SU 763682	A 15-09-1980 SU	763682 A1	15-09-1980

Best Available Copy